## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

2002-236264

(43)Date of publication of application: 23.08.2002

(51)Int.CI

G02B 26/08 H04B 10/02 H040 3/52

(21)Application number: 2001-198936

(22)Date of filing :

: 2001-198936 29.06.2001 (71)Applicant :

FUJITSU LTD TOCHIO YUJI MORI KAZUYUKI

(30)Priority

Priority number: 2000373460

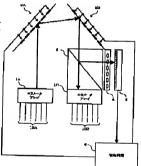
Priority date: 07.12.2000

Priority country : JP

# (54) CONTROLLING APPARATUS AND CONTROLLING METHOD OF OPTICAL SWITCHING DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a controlling apparatus of an optical switching device which automatically corrects the angle deviation of a tilt mirror used for an optical switching device, and reduces optical loss, and to provide its controlling method. SOLUTION: The controlling apparatus branches an optical signal reflected by an output side MEMS mirror array 2B by using a beam splitter 3 about a three-dimensional type optical switching device using MEMS mirror arrays 2A and 2B on which a plurality of tilt mirrors which can control the angle of a reflective surface are arranged on a plane. The branched light is received by a CCD image sensor 5 through a lens array 4, and the positional information with thintial positional information which is set in advance in accordance with the target value of the angle of reflective surface of each MEMS mirror, and the arrival position error of an optical signal is detacted. The correction control of the angle deviation of the reflective surface of each MEMS mirror is performed on the basis of the error.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

25.05.2006

#### (19)日本国特許庁 (JP)

### (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-236264

(P2002-236264A) (43)公開日 平成14年8月23日(2002.8.23)

(51) Int.Cl.	<b>徽別記号</b> 4-5 **	FI		テーマコート*(参考)
G02B 26/08		G 0 2 B 26/08	I	2H041
H 0 4 B 10/02		H 0 4 Q 3/52	2	5 K O O 2
H 0 4 Q 3/52		H 0 4 B 9/00	1	5K069

#### 審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 31 頁)

特額2001-198936(P2001-198936)	(71) 出願人	000005223
		富士通株式会社
平成13年6月29日(2001.6.29)		神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番
特顧2000-373460(P2000-373460)	(72)発明者	板尾 祐治
平成12年12月7日(2000 12 7)		神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番
		1号 富士通株式会社内
	(72)発明者	森 和行
		神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番
		1号 富士通株式会社内
	(74) (0-2011	100078330
	(4)1097	
		<b>弁理士 笹島 富二雄</b>
	平成13年6月29日(2001.6.29)	平成13年6月29日(2001.6.29) 特觀2000-373460(P2000-373460) 平成12年12月7日(2000.12.7) 日本(JP) (72)発明者

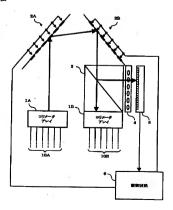
最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称】 光信号交換器の制御装置および制御方法

#### (57) 【要約】

【課題】光信号交換器に用いられるティルトミラーの角度ずれを自動的に補正して光損失を低減した光信号交換器の制御装置および制御方法を提供する。

【解決手段】本祭明による制御装置は、例えば、反射面の角度が制御可能な複数のティルトミラーを平面上に配置したMEMSミラーアレイ2A、2Bを用いた3飲元型の光信号交換器について、出力側MEMSミラーアレイ2Bで反射された光信号をピームスプリッタ3で分岐、該分岐光をレンスアレイも全介してCDイメージセンサ5で受光して分岐光の位置情報を生成し、該位置情報をと、各MEMSミラーの反射面の角度の目標値に対比較して光信号の到達位置の誤差を検出し、その誤差を基に各MEMSミラーの反射面の角度で1れを補正制御するものである。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】反射面の角度が制御可能な複数のティルト ミラーを平面上に配置した第1ミラーアレイおよび第2 ミラーアレイを有し、入力された光信号を前記第1ミラ ーアレイおよび前記第2ミラーアレイで順次反射して特 定の位置から出力する光信号交換器について、前記第1/ ミラーアレイおよび前記第2ミラーアレイの各ティルト ミラーの反射面の角度を制御する制御装置であって、

前記第2ミラーアレイで反射された光信号の出力状態を 検出する出力光検出手段と、

該出力光検出手段の検出結果に基づいて、前記第1ミラ ーアレイおよび前記第2ミラーアレイの前記光信号を反 射した各ティルトミラーの反射面の角度を判断し、該各 角度が予め設定した目標値に近づくように前記各ティル トミラーの反射面の角度を補正制御する角度制御手段 と、を備えて構成されたことを特徴とする光信号交換器

の制御装置。

【請求項2】請求項1に記載の制御装置であって、

前記出力光検出手段は、前記第2ミラーアレイで反射さ れた光信号の一部を分岐する光分岐部と、該光分岐部か 20 らの分岐光を2次元の領域を有する受光面で受光して、 前記分岐光についての位置情報を生成する位置情報生成 部と、を有し、

前記角度制御手段は、前記位置情報生成部からの位置情 報と、前記各ティルトミラーの反射面の角度の目標値に 対応させて予め設定した初期位置情報とを比較すること で、前記光信号の到達位置の誤差を検出する位置差分検 出部と、該位置差分検出部で検出された到達位置の誤差 を基に、前記各ティルトミラーの反射面の角度ずれを算 出して補正角度を演算する演算処理部と、該演算処理部 30 で演算された補正角度に従って前記各ティルトミラーの 反射面の角度を制御する補正制御部と、を有することを 特徴とする光信号交換器の制御装置。

【請求項3】請求項1に記載の制御装置であって、 前記出力光検出手段は、前記特定の位置から出力される 光信号のパワーを検出する光パワー検出部を有し、

前記角度制御手段は、前記第1ミラーアレイの各ティル トミラーの反射面の角度を一定の制御方向に段階的に変 化させる第1ミラー駆動部と、前記第2ミラーアレイの 各ティルトミラーの反射面の角度を一定の制御方向に段 40 階的に変化させる第2ミラー駆動部と、前記第1ミラー 駆動部および前記第2ミラー駆動部の少なくとも一方に より反射面の角度を変化させた時の直前および直後に前 記光パワー検出部で検出される出力光パワーの各値を比 較し、該比較結果を基に前記第1ミラー駆動部および前 記第2ミラー駆動部における各制御方向を決定して、前 記光パワー検出部で検出される出力光パワーが増大する ように前記各ティルトミラーの反射面の角度をフィード バック制御する比較制御部と、有することを特徴とする 光信号交換器の制御装置。

【請求項4】請求項3に記載の制御装置であって、

前記比較制御部は、前記第1ミラー駆動部および前記筆 2ミラー駆動に対して、制御対象となる各ティルトミラ 一の反射面の角度に関する初期値をそれぞれ与えること を特徴とする制御装置。

【請求項5】反射面の角度が制御可能な複数のティルト ミラーを平面上に配置した第1ミラーアレイおよび第2 ミラーアレイを有し、入力された光信号を前記第1ミラ ーアレイおよび前記第2ミラーアレイで順次反射して特

定の位置から出力する光信号交換器について、前記第1 ミラーアレイおよび前記第2ミラーアレイの各ティルト ミラーの反射面の角度を制御する方法であって、

前記第2ミラーアレイで反射された光信号の出力状態を 検出する出力光検出過程と、

該出力光検出過程の検出結果に基づいて、前記第15ラ ーアレイおよび前配第2ミラーアレイの前記光信号を反 射した各ティルトミラーの反射面の角度を判断し、該各 角度が予め設定した目標値に近づくように前記各ティル トミラーの反射面の角度を補正制御する角度制御過程

と、を含んでなることを特徴とする光信号交換器の制御 方法

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光信号交換器にお ける切り替え制御技術に関し、特に、マイクロマシン (MEMS: Micro Electric Mechanical System) 技術 による反射型のティルトミラーを用いた光信号交換器の 制御装置および制御方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、インターネット等におけるトラフ イックの増加に伴って光ネットワークの需要が高まって いる。このような状況において、高速・大容量のデータ を光信号のままで切り替える光信号交換器の導入が注目 されている。高速・大容量の光信号交換器を実現するた めの従来の技術としては、例えば、光ファイバをメカニ カルに切り替える方式や導波路を組み合わせた方式など が主流であった。しかし、このような従来の技術におい ては多段構成を採用する必要があったため、光信号交換 器内の光損失が非常に大きく、また、チャネル数の増大 に対応することにも限界があり、数10チャネル以上に 対応した光信号交換器の実現は困難であった。

【0003】上記のような状況において、マイクロマシ ン(MEMS)技術を応用して作製したティルトミラー (以下、MEMSミラーと呼ぶ)を用いた光スイッチ は、小型化、波長無依存および偏波無依存などの点で他 のスイッチに比べて優位性があり注目されている。特 に、例えば図45に示すように、複数のコリメータを2 次元に配置した2つのコリメータアレイ1A、1Bと、 複数のMEMSミラーを2次元に配置した2つのMEM 50 Sミラーアレイ2A、2Bを組み合わせて構成した3次 元型の光信号交換器は、光損失の低減、大容量化および 多チャンネル化が実現可能であるという点で期待されて いる。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記のようなMEMSミラーアレイ2A, 2Bを用いた3次元型の光信号交換器では、MEMSミラーの角度ずれにより、出力側のコリメータに接続された出力光ファイバに対して光信号がずれて入射してしまう可能性があり、光信号交換器内の光損失を大きくする要因になる。

【0005】図46は、上記の内容を模式的に示した図であって、(A)は光信号交換器内における光信号の入力点から出力点までの光路の一例を示した平面図、

(B) は光信号が出力光ファイバに入射する各状態を例 示した平面図である。なお、図46では、光信号交換器 内の光路の様子を分かり易く示すために、入出力コリメ ータの表示を省略している。

【0006】図46において、出力側MEMSミラーで 反射された光線は、(B)の「OK」で示すように、出 カ光ファイバのコアの部分に垂直に入る必要があり、

(B) の「NG1」または「NG3」で示すように、コアから外れたり、(B) の「NG2」で示すように、コアから外れたり、(B) の「NG2」で示すように、コアに対して斜めに入ったりしてはならない。このような出力光ファイバへの光信号の結合不良は、たとえ入出力ボートが決まっていて入力側および出力側の各MEMSミラーについての制御すべき角度がそれぞれ既知の数値であったとしても、低かな角度すれによって生じるものである。具体的には、MEMSミラーの角度が0.05。程度すれることで数はBの光損失が発生する。各MEMSミラーの角度では、各々のミラーについてその角度に対応した光信号のパワーを個別にモニタすることが不可能であるため、1組のMEMSミラーについてどちらがどれだけずれているのかを判別することが困難である。

【0007】上記のようなMEMSミラーの角度ずれを 補正するためには、例えば、出力側のMEMSミラーか らコリメータに伝験する光信号の光線位置情報をCCD イメージセンサ等を用いて検出する方法が考えられる。 しかし、この方法では、前述の図46(B)における 「OK」と「NG2」の差、または、「NG1」と「N40 の3」の差を容易に検出できない。すなわち、光線の入 射角度情報を検出しにくいという欠点がある。特に、

「NG2」の状態では、正しく光線が出力されているのかどうかの判断が困難である。

【0008】また、MEMSミラーの角度ずれを補正するための他の方法として、例えば、出力光ファイバに結合された光信号のパワーをモニタし、そのモニタ結果を基に各MEMSミラーの角度をフィードバック制御する方法も考えられる。しかし、このような方法では、光信号交換器に入力される複数のチャネルについての光パワ

一のばらつき等によって、チャネルごとの光パワー目標値が一定に定まらないため、モニタした光パワーが予め設定した初期値になるように各MEMSミラーの角度をフィードバック制御するといった方式を取ることができない。また、現在モニタしている光パワーが最大値であるかどうかを見極めることも困難であるので、上記のようなフィードバック制御の実現は容易ではない。

【0009】本発明は上記の点に着目してなされたもので、MEMSミラーの角度ずれを自動的に補正して光損 り、失の低減を図った光信号交換器の制御装置および制御方法を提供することを目的とする。

#### [0010]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた め、本発明による光信号交換器の制御装置は、反射面の 角度が制御可能な複数のティルトミラーを平面上に配置 した第1ミラーアレイおよび第2ミラーアレイを有し、 入力された光信号を第1、2ミラーアレイで順次反射し て特定の位置から出力する光信号交換器について、第 1、2ミラーアレイの各ティルトミラーの反射面の角度 を制御する制御装置であって、第2ミラーアレイで反射 された光信号の出力状態を検出する出力光検出手段と、 該出力光検出手段の検出結果に基づいて、第1、2ミラ 一アレイの光信号を反射した各ティルトミラーの反射而 の角度を判断し、該各角度が予め設定した目標値に近づ くように各ティルトミラーの反射面の角度を補正制御す る角度制御手段と、を備えて構成されるものである。 【0011】かかる構成では、いわゆる3次元型の光信 号交換器について、出力側に位置する第2ミラーアレイ で反射された光信号の到達位置や光パワーなどに関する 出力情報が出力光検出手段で検出される。そして、出力 光検出手段の検出結果が角度制御手段に送られ、角度制 御手段では、光信号を順次反射した各ティルトミラーの 反射面の角度が出力光検出手段からの検出結果に基づい て判断され、各角度の目標値からのずれを補正する制御 が行われるようになる。これにより、低光損失、かつ、 高精度の光信号交換器を実現することができるようにな る。

【0012】上記の制御装置についての1つの態様として、出力光検出手段は、第2ミラーアレイで反射された、光信号の一部を分岐する光分岐部と、該光分岐部から分岐光を2次元の領域を有する受光面で受光して、分岐光についての位置情報を生成する位置情報生成部と情報と、各ティルトミラーの反射面の角度の目標値に対応、と、各ティルトミラーの反射面の角度が重要が使出された到達位置差分検出部で検出された到達位置差分検出部と、各度を演算する演算処理部と、該を算していませていませていませていませていませていませていませていませば、まない。

する補正制御部と、を有するようにしてもよい。

【0013】かかる構成では、第2ミラーアレイで反射 された光信号についての位置情報が検出されるようにな り、その位置情報と予め設定した初期位置情報とを比較 することにより出力光の到達位置の製差が検出され、該 製造を基にして各ティルトミラーの反射面の角度ずれが 算出されて補正角度が演算される。そして、演算した補 正角度に従って各ティルトミラーの反射面の角度が制御 されるようになる。

【0014】上記の制御装置についての他の態様として、出力光検出手段は、特定の位置から出力される光信号のパワーを検出する光パワー検出部を有し、角度制御手段は、第1ミラーアレイの各ティルトミラーの反射面の角度を一定の制御方向に段階的に変化させる第1ミラー駅動館と、第2ミラーアレイの各ティルトミラーの反射面の角度を一定の制御方向に段階的に変化させる第2ミラー駅動館と、第1、2ミラー駅動館の少なくとも方により反射面の角度を変化させた時の直前および直後に光パワー検出部で検出される出力光パワー会値を比したが、12に第1、2ミラー駅動館における各制御方向を決定して、光パワー検出部で検出される出力光パワーが増大するように各ティルトミラーの反射面の角度をフィードバック制御する比較制御部と、を有するようにしてもよい。

【0015】かかる構成では、第2ミラーアレイで反射されて特定の位置から出力される光信号のパワーが検出され、その出か光パワーの変化が、第1、2ミラー駆動部の少なくとも一方により反射面の角度を変化させた時の前後で比較され、その比較結果に基づいて第1、2ミラー駆動部における各側割方向が決定されて、以降、検 30出される出力光パワーが増大するように各ティルトミラーの反射面の角度がフィードパック制御されるようになる。

【0016】また、上配の制御装置について、比較制御 部は、第1ミラー駆動配および第2ミラー駆動に対し て、制御対象となる各ティルトミラーの反射面の角度に 関する初期値をそれぞれ与えるようにしてもよい。この ような構成では、各ティルトミラーの反射面角度につい て初期値が与えられることにより、ミラー調整速度の向 上が図られるようになる。

【0017】本発明による光信号交換器の制御方法は、 反射面の角度が制御可能な複数のティルトミラーを平面 上に配置した第1ミラーアレイおよび第2ミラーアレイ を有し、入力された光信号を第1、2ミラーアレイで順 次反射して特定の位置から出力する光信号交換器について、第1、2ミラーアレイの各ティルトミラーの反射面 の角度を制御する方法であって、第2ミラーアレイで反 財された光信号の出力水能を検出する出力が検出過程 と、該出力光検出過程の検出結果に基づいて、第1、2 射面の角度を判断し、該各角度が予め設定した目標値に 近づくように各ティルトミラーの反射面の角度を補正制 御する角度制御過程と、を含んでなる方法である。

【発明の実施の形態】以下: 本発明の実施の形態を図面

[0018]

に基づいて設明する。図1は、本発明の第1実施形態にかかる光信号交換器の制御装置の全体構成を示す概略図である光信号交換器の制御装置の全体構成を示す概略図えば、上述の図45に示した従来の帰成と同様に、複変レイ1A,1Bと、該各コリメータアレイ1A,1Bと、該各コリメータアレイ1A,1Bと、該各コリメータアレイ1A,1Bと、該公の上後数のMEMSミラーを2次元に配置した2つのMEMSミラーを2次元に配置した2つのMEMSミラーアレイ2A、2Bとを組み合わせて構成した3次元型の光信号交換器について、光分岐応と世のビームスプリッタ3とレンズフレイ4と、角度制御手段としての間側回路6とを備えた割御装置を設けたものである。なお、ここでは、MEMSミラーアレイ2Aが第1ミラーアレイに相当する。

【0019】光信号交換器のコリメータアレイ1Aには、各コリメータに対応させて複数の光ファイパを2次元に配置した入力光ファイパアレイ10Aが接続され、各入力光ファイパから出射された光が各々のコリメータを通過して平行光となりMEMSミラーアレイ2Aに向けて送られる。また、コリメータアレイ1Bにも、各コリメータに対応させて複数の光ファイパを2次元に配置した出力光ファイパアレイ10Bが接続され、MEMSミラーアレイ2Bで反射された光が、各コリメメータを通過して各々の出力光ファイパに結合される。

【0020】MEMSミラーアレイ2Aは、各MEMSミラーの頻幅が配列された平面の法線方向が、コリメータアレイ1Aから送られてくる光信号の伝機方向(光軸方向)に対して非平行となるように傾けて配置される。また、MEMSミラーアレイ2Bは、MEMSミラーアレイ2Aの各MEMSミラーで再度反射してコリメータアレイ1Bに導く所要の位置に配置される。各MEMSミラーは、マイクロマシン(MEMS)技術を応用して作製した公知のマイクロティルトミラーであって、具体的には、例えばトーションバーにより支持され上面にミラーが形成された可動板をソリコン基板に一体に設け、該可動板を電磁カにより一・ションバーを軸にして回動させることでミラーの接角を可変制御するものである。

て、第1、2ミラーアレイの各ティルトミラーの反射面 の角度を制御する方法であって、第2ミラーアレイで反 財された光信号の出力状態を検出する出力光検出過程 と、隊出力光検出過程の検出結果に基づいて、第1、2 ミラーアレイの光信号を反射した各ティルトミラーの反 50 れる光信号の一部を分岐してレンズアレイ4に送る。レ

7

【0022】図2は、制御回路6の具体的な機能構成の一例を示すプロック図である。図2の構成例では、CCDイメージセンサ5にてモニタされた位置情報が、位置情報記憶部6名に書き込まれる。位置情報記憶部6名の具体的な構成としては、例えば図3に示すように、後段で実行される位置情報の比較処理を考慮して、FIFO(First In First Out)方式のデータ処理に対応した構成とし、ここでは、各軸(X軸、Y軸)ごとに位置情報を切り出して保存する方式を採用している。

【0023】また、初期位置情報記憶部6Bには、出力 側の各コリメータにそれぞれ対応させて予め設定された 初期位置情報が記憶されている。この初期位置情報記憶 部6Bの具体的な構成も、例えば、上記位置情報記憶部 6 Aの構成と同様にFIFO方式のデータ処理に対応し た構成とし、ここでは、各軸 (X軸、Y軸) ごとに初期 30 位置情報を切り出して保存する方式を採用している。具 体的な初期位置情報としては、例えば、図4に示すよう なMEMSミラーアレイ2A, 2Bの配置において、す べてのMEMSミラーを非駆動状態(電気的な印加がな く傾斜角度が0度となる状態)としたときの光結合状態 が初期位置情報記憶部6Bに記憶される。このような状 態では、出力側の各MEMSミラーで反射された光信号 が、前述の図46 (B) に示した「OK」の状態で対応 する出力光ファイバに結合することになる。なお、本発 明における初期位置情報は、上記のような設定状態に限 40 定されるものではなく、光信号が出力光ファイバのコア の部分に垂直に入射するような任意の状態を設定するこ とが可能である。

【0024】図2に示す位置整分検出部(X軸)6 Cは、位置情報記憶部6 Aおよび初期位置情報記憶部6 B B に記憶されたX軸についての位置情報および初期位置情報をそれぞれ認み出して各々の情報を比較することで、CCDイメージセンサ5でモニタされた光信号についての初期位置に対する位置ずれD1を検出し、その検出結果を演集処理部6 J に出力する。また、これと同様にし 50

て位置差分検出部 (Y軸) 6 D も、Y軸についての位置 情報および初期位置情報をそれぞれ読み出して比較する ことで位置ずれD<sub>1</sub>を検出して演算処理部 6 J に出力す る。

【0026】D/A変換部(X軸)6EおよびD/A変 ) 換部 (Y軸)6Fは、後述する質算処理部6Jからの出 が信号をD/A変換した後に、各MEMSミラードラ べ6G、6Hにそれぞれ出力する。MEMSミラードラ イバ6Gは、入力側MEMSミラーアレイ1Aの各ME MSミラーに対し、AD/A変換部6E,6Fからの ラーの角度を駆動制御する。MEMSミラードライバら 日は、出力側MEMSミラーアレイ1Bの各MEM 日は、出力側MEMSミラーアレイ1Bの各MEM 日は、出力側MEMSミラーアレイ1Bの各MEM に応じた電圧信号を印加して、各々のMEMSミラーに対し、各D/A変換部6E,6Fからの出力信号 に応じた電圧信号を印加して、各々のMEMSミラーの 角度を駆動制御する。

【0027] 印加電圧跳み取り部6 I は、各MEMSミラードライバ6 G、6 Hによって駆動される各MEMSミラーアレイ1 A、1 Bへの印加電圧値を、各軸方向にかいてそれぞれ読み取って演算処理部6 J は、位置差分検出部(X 軸) 6 C および位置差分検出部(X 軸) 6 C および位置差分検出部(X 軸) 6 Dで検出された位置すれ口。D、と、印加電圧読み取り部6 I で読み取られた印加電圧値とを基に、入力側および出力側の各 MEM Sミラードライバ6 G、6 Hにフィードバックして各M Sミラードライバ6 G、6 Hにフィードバックして各M EM Sミラードライバ6 G、6 Hにフィードバックして各M EM Sミラーの角度すれを補正する。

【0028】ここで、液算処理部6」で実行される液算処理について説明する。ただし、ここでは前述の図4に 示したようなコリメータアレイ1A、18およびMEM Sミラーアレイ2A、28の配置を想定し、X軸方向についての角度ずれの液算方法を具体的に説明することに する。なお、Y軸方向についての角度ずれの液算方法・は、X軸方向の場合と同様であるため説明を省略する。 【0029】まず、図6(A)に示すように、入力側の

コリメータアレイ1AからMEMSミラーアレイ2Aに 送られる光信号の入力点をINとし、その入力点INか らの光信号を反射する入力側のMEMSミラーを2aと する。また、MEMSミラー2aからの光を再度反射す る出力側のMEMSミラーを2bとし、このMEMSミ ラー2bで反射された光が出力光ファイバのコアの部分 に垂直に入射する光結合状態を考えたときのCCDイメ ージセンサ5上の到達点をOUTとする。さらに、ME MSミラー2aからMEMSミラー2bまでの距離をL 1とし、MEMSミラー2bからCCDイメージセンサ、10 MEMSミラー2aの反射点からCCDイメージセンサ 5までの距離をL2とする。なお、図6 (A) には、X 軸方向(Y軸に垂直な平面)について、CCDイメージ センサ5上の到達点OUTをMEMSミラー2bで反射 された光の伝搬方向に投影した状態が示してある。ま た、各距離 L 1. L 2は、各ミラーの反射面のサイズに\*

ここで、各MEMSミラー2a、2bのずれ角度α、β は、実際の使用状態を考慮すると非常に小さくなること が想定されるので ( $|\alpha|$ ,  $|\beta| \ll 1$ )、上記 (1) 式の関係は次の(1) 、式に近似することが可能であ る。

 $D = L 1 \times 2 \alpha + L 2 \times 2 (\alpha - \beta) \cdots (1)$ 

上記(1), 式について、距離L1, L2は、各MEM Sミラー2a, 2bの配置が決定されれば既知の値を設 定することができる。従って、各MEMSミラー2a, 2 b のずれ角度 α. βは、上記 (1) '式の関係を基 に、位置差分検出部 (X軸) 6 Cで検出される位置ずれ Dxの値とを用いて、次に示すような手順に従って算出 することが可能になる。

【0032】まず始めに、MEMSミラー2bの角度を※30 【0033】

\* 比べて十分に長いため、各ミラーの角度が変化しても有 意な誤差は生じないものとする。

10

【0030】上記のような状態において、図6 (A) に 示すように、MEMSミラー2aの振角が予め設定され た所定値から角度αだけずれ、また、MEMSミラー2 bの振角が予め設定された所定値から角度なだけずれた 場合を考えると、各MEMSミラー2a.2hで反射さ れた光信号は、CCDイメージセンサ5上の到達点OU Tから距離Dだけずれた位置で受光されることになる。

5上の到達点までの光信号の軌跡は、図6 (B) に示す 幾何学的な関係と等価であり、位置ずれ口は、距離し L2およびずれ角度α、βを用いて次の(1)式で 表すことができる。

[0031]

 $D = L1 \times tan 2\alpha + L2 \times tan 2(\alpha - \beta) \cdots (1)$ 

※調整して、光信号のCCDイメージセンサ5上の到達位 置が目標到達点OUTに一致するような状態をつくる。 具体的には、位置差分検出部(X軸)6Cで検出される

20 位置ずれDxの値がOとなるまで、MEMSミラー2b の角度を強制的にずらして行く。図7(A)は上記のよ うな状態を図6 (A) の場合と同様にして示したもので あり、図7 (B) は幾何学的に等価な関係を示したもの である。このとき、MEMSミラー2bについて調整し た(ずらした)角度 8 \*は、印加電圧読み取り部6 1 か らの出力情報を基に、MEMSミラードライバ6Hにお ける印加電圧変化量をモニタすることで分かる。また、 このような状態においては、図7 (B) の幾何学的な関 係より、次の(2)式が成立する。

 $L1 \times tan2\alpha = L2 \times tan\gamma = L2 \times tan\{2\theta_1 - 2(\alpha - \beta)\}$ 

L1: L2 = tan { $2\theta_1 - 2(\alpha - \beta)$ } : tan  $2\alpha - (2)$ 

ここで、 | α | , | β | ≪1とすると、上記 (2) 式の 関係は次の(2),式に近似することが可能である。 [0034]

 $L1:L2=2\theta_1-2(\alpha-\beta):2\alpha\cdots(2)$ 次に、MEMSミラー2bの角度を元の状態(角度βだ けずれた状態) に戻した後、今度は、MEMSミラー2 aの角度を調整して、光信号のCCDイメージセンサ5 40 上の到達位置が目標到達点OUTに一致するような状態 をつくる。具体的には、前述したMEMSミラー2bの 場合と同様にして、位置差分検出部(X軸)6Cで検出 される位置ずれDxの値がOとなるまで、MEMSミラ★

★-2aの角度を強制的にずらして行く。図8(A)は上 記のような状態を図6(A)の場合と同様にして示した ものであり、図8 (B) は幾何学的に等価な関係を示し たものである。このとき、MEMSミラー2aについて 調整した (ずらした) 角度  $\theta_{A}$ も、前述したMEMSミ ラー2 b の場合と同様にして、印加電圧読み取り部6 1 からの出力情報を基に、MEMSミラードライバ6Gに おける印加電圧変化量をモニタすることで分かる。ま た、このような状態においては、図8(B)の幾何学的 な関係より、次の(3)式が成立する。

 $L1 \times tan2 (\alpha - \theta_{\Lambda}) = L2 \times tan\gamma'$  $= L 2 \times t a n \{2 \theta_{\lambda} - 2 (\alpha - \beta)\}$ L1: L2= tan {2 $\theta_{A}$ -2 ( $\alpha$ - $\beta$ )} : tan 2 ( $\alpha$ - $\theta_{A}$ ) ... (3

ここで、 | α | , | β | ≪ 1 とすると、上記 (3) 式の 関係は次の(3) 対に近似することが可能である。

[0036]

[0035]

【0037】上記のような一連の手順に従って、MEM Sミラーアレイ24、2Bの各MEMSミラーの組みを わせことに、X軸方向およびY軸方向についての角度す れの補正を行うことで、各MEMSミラーアレイ2A、 2Bで反射された光信号は、出力側のコリメータアレイ Bを介して対応する出力光ファイバのコア部分に垂直 に入射するようになる。

【0038】このように第1実施形態によれば、各ME MSミラーアレイ2A、2Bで反射された光信号についての位置情報をCCDイメージセンサ5を用いて検出し、その位置情報を基に入力側はよび出力側の各MEM Sミラーのずれ角度を自動的に補正するようにしたことで、低光損失、かつ、高精度の光信号交換器を実現することができる。これにより、小型で大容量の光交換機や光スイッチの開発が可能になる。

【0039】なお、上述した第1実施形態における各M EMSミラーのずれ角度の補正方法については、制御開始時の状態において、位置差分検出部60元、60 Pで検出される位置すれが発生していない、(D<sub>1</sub>, D<sub>7</sub>=0) 場合には、各MEMSミラーの角度を強制的にずらして角度 30 $\theta$ 1,  $\theta$ 1, を得ることが不可能であり、かつ、出力光ファイバのコアに対して光信号が遊龍に入射されているのか(図46(B)における「OK」の状態)、斜めに入射されているのか(図46(B)における「OK」の状態)、斜めに入射されているのか(図46(B)における「NG2」の状態)を判別することが困難である。

【0040】このような場合には、例えば図9の等価図に示すように、入力側および出力側の各MEMSミラー2a,2bの補正角度をα',β'とし、該各補正角度α',β'を、次の(4)式の関係を満たす任意の角度で同時に動かしてみることで、出力光ファイバへの光信40分析態を制別することが可能である。

 $\alpha': \beta' = L 2: L 1 + L 2 \cdots (4)$  すなわち、補正角度 $\alpha'$  ,  $\beta'$  を同時に動かしても、位置差分検出部6 C , 6 Dで有意な位置すれが検出されなければ、出力光ファイバのコアに対して光信号が基直に入射していると判断できるため、このような場合には、各MEMSミラー2 a , 2 bの角度を初めの状態に戻せばよい。一方、補正角度 $\alpha'$  ,  $\beta'$  を同時に動かすことで、新たに位置すれが検出されれば、出力大フィバのコアに対して光信号が終めたれば、出力大フィバのコアに対して光信号が終めに入っていると判断できるの 50

で、このような場合には、位置ずれが検出された状態を 基に、上述した第1実施形態における補正方法に従って 各MEMSミラーの角度補正を行えばよい。

【0041】また、制御開始時の状態で位置ずれが発生 していない場合の他の対処方法としては、出力側のME MSミラーのみを動かすことでも、出力光ファイバへの 光信号の入射状態を判別することが可能である。具体的 には、出力光ファイバのコアに対して光信号が垂直に入 10 射されている状態であれば、出力側MEMSミラーの補

正角度 $\beta$ ' と、位置差分検出部で検出される位置ずれD との関係は、次 $\sigma$ (5)式に従うことになる。

[0042]

D=L2×tan2β'≒L2×2β' … (5) 従って、出力側MEMSミラーの角度を変化させたとき に位置差分検出部で検出される位置ずれDが、上記

(5) 式の関係に従って変化しない場合には、出力光ファイバのコアに対して光信号が斜めに入っていることになるので、このような場合には、位置すれのモリた状態のを基に、上述した第1実施形態における補正方法に従って各MEMSミラーの角度補正を行えばよい。

【0043】さらに、出力光ファイバのコアに対する光信号の入射状態は、CCDイメージセンサ5で得られる画像を基に判別することも可能である。すなわち、CCDイメージセンサ5で得られる画像は、例えば図10の下段に示すように、光信号の各入射状態(OK、NG1~NG3)に応じて変化するので、制御開始時の状態で位置ずれが発生していない場合、CCDイメージセンサ5の画像は「OK」または「NG2」にあるように図形的な差異が生じることになる。この図形的な差異を判別することは公知の画像処理技術を適用することにより実現可能である。

【0044】具体的な画像処理方法としては、例えば図11に示すように、位置情報配館部6Aおよび初期位置情報配館部6Bに記憶された各情報をシリアルに読み出し、位置情報配憶部6A側からの位置情報はシフトレジスタを介して排他的論理和回路に入力し、初期位置情報記憶部6B側からの初期位置情報はそのまま神色的論理和回路に入力する。そして、排他的論理和回路からの出力がすべてローレベルとなれば、初期位置情報で表される図形とCCDイメージセンサラで得られた画像の図形ということになる。

【0045】上記のようた画像処理によって「NG2」の状態が判別されれば、該当するMEMSミラーの角度を変化させて位置差分検出部で有意な位置すれが検出される状態をつくり、上述した第1実施形態における補正方法に従って各MEMSミラーの角度補正を行えばよい。加えて、CCDイメージセンサ5で得られる画像を用いて、出力光ファイバのコアに対する光信号の入射状態を判別するようにした場合には、上述した第1実施形態を判別するようにした場合には、上述した第1実施形態を判別するようにした場合には、上述した第1実施形態を判別するようにした場合には、上述した第1実施形

態における補正方法の簡略化を図ることも可能になる。 【0046】すなわち、図10において、出力光ファイ バに対して光信号が垂直に入射している「OK」の状態 と、光信号が垂直には入射しているが位置ずれを起こし ている「NG1」の状態とでは、CCDイメージセンサ 5の画像が図形的に同じになる。従って、位置差分検出 部で有意な位置ずれが検出されていて、かつ、画像処理 により垂直方向の入射が検出された場合には、「NG 1」の状態を判別できる。この「NG1」の状態は、図 12に示すように、入力側のMEMSミラー2aのずれ 10 角度 α と、出力側のMEMSミラー2hのずれ角度 R と か略一致している (α = β) ことになる。このα = β の 状態に着目すると、各々のMEMSミラー2a、2bを 同一角度で動かしながらずれの補正を行うことが可能に なる。具体的には、各MEMSミラー2a、2hの補正 角度 $\alpha' = B'$ は、上述の(1),式より、位置差分検 出部で検出される位置ずれDを用いて次の (6) 式で表 すことができる。

[0047]

 $\alpha' = \beta' = L1/(2 \times D) \cdots (6)$ 

これにより、上述した(2) ' 式および(3) ' 式の連 立方程式を解くという処理を実行しなくても、位置差分 検出部の検出結果に応じて補正角度を決定することが可 能になる。また、第1実施形態における各MEMSミラ 一のずれ角度の補正方法の簡略化という点については、 次のような応用も可能である。

【0048】例えば、各MEMSミラーアレイ2A、2 BおよびCCDイメージセンサ5の配置について、L1 ≪L2の関係が成り立つようであれば、上述した

(1) 対に示した関係はさらに次の(1) , 式に近 30 似することが可能である。

 $D=2 (\alpha-\beta) \times L 2 \cdots (1)$ 

このような場合には、出力側MEMSミラーアレイ2B の各MEMSミラーについてのみ角度ずれを補正制御す ることで、簡易的に光損失の低減を実現することが可能 である。なお、上記の場合には、出力側MEMSミラー の補正角度  $\beta$  として、  $\beta$  =  $\alpha - \beta = D$  / (2×L) 2)を与えればよい。

【0049】また例えば、L1≪L2の関係が成り立つ ようであれば、上述した(1),式に示した関係はさら 40 に次の(1)'' 式に近似することが可能である。  $D = 2 \times \alpha \times L1 \cdots (1)$ ''

このような場合には、入力側MEMSミラーアレイ2A の各MEMSミラーについてのみ角度ずれを補正制御す ることで、簡易的に光損失の低減を実現することが可能\*

\* である。なお、上記の場合には、入力側MEMSミラー の補正角度 $\alpha$ 'として、 $\alpha$ '=D/(2×L1)を与え ればよい。

14

【0050】次に、本発明の第2実施形態にかかる光信 号交換器の制御装置について説明する。図13は、第2 実施形態かかる光信号交換器の制御装置の要部構成を示 す概略図である。なお、第1実施形態の構成と同じの部 分には同一の符号が付してあり、以下同様とする。

【0051】図13において、第2実施形態の構成は、

上述した第1実施形態の構成について、例えば、ビーム スプリッタ3とコリメータアレイ1 Bの間にビームスプ リッタ3'をさらに挿入し、このビームスプリッタ3' で分岐された光をレンズアレイ4'を介してCCDイメ ージセンサ5'で受光して、各MEMSミラーアレイ2 A. 2Bで反射された光信号についての別の位置情報を 生成するようにしたものである。なお、新たに殴けたビ ームスプリッタ3′、レンズアレイ4′およびCCDイ メージセンサ5'は、第1実施形態で用いたビームスプ リッタ3、レンズアレイ4およびCCDイメージセンサ 5と同様のものである。

【0052】上記のような構成では、ビームスプリッ タ、レンズアレイおよびCCDイメージセンサをり組用 いて光路長の異なる位置情報が生成され、それぞれの位 置情報に基づいて各MEMSミラーアレイ2A,2Bの ずれ角度の補正が行われる。この場合のずれ角度の補正 方法は、各CCDイメージセンサ5、5'で得られる各 々の位置情報に応じて検出される位置ずれD. D'の値 によって、入力側および出力側の各MEMSミラーの補 正角度が一意に定まり、上述した第1実施形態の場合の ようにMEMSミラーを強制的に動かす必要がなくな

【0053】具体的には、上述の図6などに示した場合 と同様にして、入力側のMEMSミラー2aのずれ角度 をα、出力側のMEMSミラー2bのずれ角度をβと し、また、MEMSミラー2aからMEMSミラー2b までの距離をL1、MEMSミラー2bからCCDイメ ージセンサ5までの距離をL2とする。さらに、ここで は、MEMSミラー2bからCCDイメージセンサ5' までの距離をL2'とする。この場合、各CCDイメー ジセンサ5,5'で得られる画像を用いて検出される位 置ずれD, D'は、距離L1, L2, L2' およびずれ 角度α, βを用いて次の(7)(8)式で表すことがで きる。

[0054]

 $D = L 1 \times t a n 2 \alpha + L 2 \times t a n 2 (\alpha - \beta) \cdots (7)$  $D' = L1 \times t \cdot a \cdot n \cdot 2 \cdot \alpha + L \cdot 2' \times t \cdot a \cdot n \cdot 2 \cdot (\alpha - \beta) \quad \cdots \quad (8)$ 

また、 | α | , | β | ≪ 1 とすると、上記 (7) (8) ※能である。

式の関係は次の (7) '(8) '式に近似することが可%

 $D = L 1 \times 2 \alpha + L 2 \times 2 (\alpha - \beta)$ 

15

 $= 2 \times (L1 + L2) \times \alpha - 2 \times L2 \times 6 \cdots (7)$  $D' = L 1 \times 2 \alpha + L 2' \times 2 (\alpha - \beta)$ 

 $= 2 \times (L1 + L2') \times \alpha - 2 \times L2' \times \beta \cdots (8)'$ 

上記(7)、式および(8)、式の関係を基に、未知数 αおよびβに関する連立方程式を解くことが可能であ り、算出されたずれ角度α、βがそれぞれ補正されるよ うに各MEMSミラードライバの印加電圧が決定され て、各MEMSミラー2a、2bの角度補正が行われ

【0055】このように第2実施形態によれば、ビーム 10 スプリッタ、レンズアレイおよびCCDイメージセンサ を2組用いて光路長の異なる位置情報が得られるように したことで、各MEMSミラー2a、2bの角度補正を 高い精度で行うことができる。また、第1実施形態の場 合のように各MEMSミラー2a、2bの角度を強制的 に動かすといった操作が不要になるため、制御速度を上 げることも可能になる。

【0056】ここで、上記第2実施形態の応用例につい て説明しておく。図14は、第2実施形態に関連する第 1の応用例の要部構成を示す概略図である。図14にお 20 いて、第1の応用例では、第2実施形態で用いたビーム スプリッタ3'に代えて、ビームスプリッタ3にハーフ ミラー7が装着され、該ハーフミラー7で折り返された 光信号の一部がレンズアレイ4,を介してCCDイメー ジセンサ5'で受光され位置情報が生成されるようにし たものである。この場合のMEMSミラー2bからCC Dイメージセンサ5'までの距離L2'は、MEMSミ ラー2bから、ビームスプリッタ3、ハーフミラー7、 ビームスプリッタ3、CCDイメージセンサ5'までの 間の距離となる。このような構成においても前述した第 30 2:実施形態の場合と同様の効果を得ることが可能であ る。

【0057】なお、図14の構成例では、ハーフミラー 7で折り返されビームスプリッタ3で分岐された光をC CDイメージセンサ5°で受光するようにしたが、例え ば図15に示すように、入力側のコリメータアレイ1A とMEMS ミラーアレイ 2 Aの間にビームスプリッタ 3'を配置し、ハーフミラー7で折り返され各MEMS ミラーアレイ2B、2Aで反射された光信号をビームス プリッタ3'で分岐してCCDイメージセンサ5'で受 光するようにしても構わない。

【0058】図16は、第2実施形態に関連する第2の 応用例の要部構成を示す概略図である。図16におい て、第2の応用例では、出力側の各コリメータまたはそ れに接続する出力光ファイバに別途光源8が接続され、 該光源8から出射される光が出力側のコリメータからビ ームスプリッタ3、出力側のMEMSミラーアレイ1 B、入力側のMEMSミラーアレイ1B、ビームスプリ ッタ3'に向けて伝搬され、該ビームスプリッタ3'で ジセンサ5'で受光され位置情報が生成されるようにし たものである。この場合、CCDイメージセンサ5で得 られる画像を用いて検出される位置ずれ口は 次の (9) 式で表すことができ、また、CCDイメージセン サ5'で得られる画像を用いて検出される位置ずれD' は、次の(10)式で表すことができる。

[0059]

 $D = L 1 \times t a n 2 \alpha + L 2 \times t a n 2 (\alpha - \beta)$  $= L1 \times 2\alpha + L2 \times 2(\alpha - \beta) \cdots (9)$ D' = L1 × t a n 2  $\beta$  + L3 × t a n 2 ( $\alpha$  -  $\beta$ )  $= L 1 \times 2 \beta + L 3 \times 2 (\alpha - \beta) \cdots (1 0)$ なお、入力側のMEMSミラーからCCDイメージセン サ5'までの距離をL3としている。このような構成に おいても前述した第2実施形態の場合と同様の効果を得 ることが可能である。

【0060】図17は、第2室施形能に関連する第3の 応用例の要部構成を示す概略図である。図17におい て、第3の応用例では、ビームスプリッタ3で分岐され た光を受光するCCDイメージセンサ5の受光面の位置 が、光の伝搬方向に対して移動可能とされることで、第 2 実施形態で用いたビームスプリッタ3' レンズアレ イ4' およびCCDイメージセンサ5' が設けられなく ても、光路長の異なる位置情報が得られるようにしたも のである。この場合、出力側のMEMSミラーからCC Dイメージセンサ5までの距離L2がCCDイメージセ ンサ5の受光面の位置に応じて変化し、それぞれの受光 面の位置で得られた画像を基に光信号の位置ずれD D'が検出されることになる。

【0061】次に、本実施形態の第3実施形態にかかる 光信号交換器の制御装置について説明する。上述の第 1、2実施形態では、CCDイメージセンサを用いて検 出した光信号の位置情報を基に各MEMSミラーアレイ の角度補正を行う場合について説明した。これに対して 第3実施形態では、出力光ファイバに結合された光信号 のパワーをモニタし、そのモニタ結果を基に各MEMS ミラーアレイの角度補正を行う場合を説明する。

【0062】図18は、第3実施形態かかる光信号交換 器の制御装置の全体構成を示す概略図である。図18に おいて、第3実施形態の全体構成は、例えば、上述の図 45に示した従来の構成と同様に、複数のコリメータを 2次元に配置した2つのコリメータアレイ1A、1B と、該各コリメータアレイ1A,1Bの各々のコリメー タに対応した複数のMEMSミラーを2次元に配置した 2 つのMEMSミラーアレイ 2 A、 2 B とを組み合わせ て構成した3次元型の光信号交換器について、出力側の コリメータアレイ1Bに接続される出力光ファイバアレ 分岐された光がレンズアレイ4'を介してCCDイメー 50 イ10Bの後段に設けられる光カプラアレイ11と、該

光カプラアレイ11の各光カプラ11で分岐された光のパワーを検出する光パワー検出部12と、該光パワー検出部12の検出結果を基に、出力光ファイバに対する光 信号の結合状態を判別して各MEMSミラー駆動部14人、14日を制御する比較制御部13とを備えた制御装置を設けたものである。なお、ここでは、MEMSミラーアレイ2Aが第1ミラーアレイに相当し、MEMSミラーアレイ2Bが第2ミラーアレイに相当し、MEMSミラー駆動部14Aが第1ミラー駆動部に相当し、MEMSミラー駆動部14Aが第1ミラー駆動部に相当する。

【0063】光カプラアレイ11は、出力光ファイバア レイ10Bの各出力光ファイバに対応した複数の光カプ ラが配置されていて、各出力光ファイバを伝搬する光信 号の一部が各々の光カプラで分岐されて光パワー検出部 12に送られる。光パワー検出部12は、例えば図19 の左側上部に示すように、光カプラアレイ11の各光カ プラで分岐されたモニタ光を受光してその光パワーに応 じた電流信号を発生する光検出器12Aと、該光検出器 12 Aから出力される電流信号を電圧信号に変換する I /V変換器12Bと、を有する。なお、図19では1組 の光検出器12Aおよび1/V変換器12Bのみが示し てあるが、実際には、光カプラアレイ11の各光カプラ にそれぞれ対応した、すなわち、光信号交換器の出力チ ャネル数に対応した光検出器12AおよびI/V変換器 12Bが光パワー検出部12に設けられているものとす る。

[0064] 比較制御部13は、例えば図19の中央上部に示すように、A/D変換器13A、デコード回路13B、ホルド回路13B、比較回路13D、カウンタ 30制御信号生成回路13E、制御監視回路13Fおよびセレクタ13Gを有する。なお、ここでも1つの出力チャネルに対応した構成のみについて図示したが、実際の比較制御部13は、光信号交換器の出力チャネル数に対応した同様の構成を備えているものとする。

【0065】A/D変換器13Aは、光パワー検出部12から出力されるアナログの電圧信号をデジタル信号に変換する一般的な電気回路であり、変換されたデジタルの電圧信号は、比較回路13Dの一方の入力端子に送られるとともに、デコード回路13Bにも送られる。デコード回路13Bは、A/D変換器13Aからのデジタル信号をデコードしてホールド回路13Cに出力する。ホールド回路13Cには、所要の周波数のクロック信号CLKが入力されていて、デコード回路13Bからの出力信号が予め設定した一定時間だけ保持された後に、比較回路13Dの他方の入力端子に送られる。このホールド回路13Cにおいて信号が保持される時間は、例えば、後述するような各MEMSミラーのフィードバック制御が1サイクル完了する時間に対応させて設定されるものとする。

18

【0067】カウンタ制御信号生成部13Eは、比較回路13Dからの出力信号のレベルに応じてカウンタ制御信号を生成する。このカウンタ制御信号を生成する。このカウンタ制御信号は、各MEMSミラー駆動部14A、14Bの後述するU/Dカウンタ21X、21Yのカウント値を制御するための信号である。ここでは、カウンタ制御信号が、セレクタ13Gを介して対応するMEMSミラー駆動部14A、14Bに振り分けられるようにしている。

【0068】制御監視回路13Fは、カウンタ制御信号 生成節13Eが比較回路13Dからの出力信号のレベル に対してカウント値を増加させるカウンタ制御信号(以 下、カウンタUp信号とする)を与えるのか、或いは、 減少させるカウンタ制御信号(以下、カウンタDown 信号とする)を与えるのかを決める指令を、比較回路1 3Dからの出力信号に応じて生成し、該指令をカウンタ 制御信号生成部13Eおよびセレクタ13Gに伝えるための回路である。このような指令をカウンタ制御信号生成部13Eおよびセレクタ13Gに伝える地の回路である。このような指令をカウンタ制御信号生成部13Eおよびセレクタ13Gに伝える理由について は後述する。

【0069】MEMSミラー駆動部14Aは、光信号交 換器の入力側のMEMSミラーアレイ2Aを駆動制御す るものである。具体的には、MEMSミラーアレイ2A の各MEMSミラーに対応させて、例えば図19の中段 部分に示すように、セレクタ20と、X軸方向に対応し たU/Dカウンタ21XおよびD/A変換器22Xと、 Y軸方向に対応したU/Dカウンタ21YおよびD/A 変換器22Yと、MEMSミラードライバ23とを有す る。また、MEMSミラー駆動部14Bは、光信号交換 器の出力側のMEMSミラーアレイ2Bを駆動制御する ものである。具体的には、MEMSミラーアレイ2Bの 各MEMSミラーに対応させて、例えば図19の下段部 分に示すように、X軸方向に対応したU/Dカウンタ2 1 XおよびD/A変換器22 Xと、Y軸方向に対応した U/Dカウンタ21YおよびD/A変換器22Yと、M EMSミラードライバ23と、を有する。なお、図19 の各MEMSミラー駆動部14A, 14Bには、1つの MEMSミラー(1つのチャネル)に対応した構成のみ がそれぞれ示してある。

50 【0070】MEMSミラー駆動部14Aに設けられる

セレクタ20は、比較制御部13からのカウンタ制御信 号に応じて、MEMSミラーアレイ2Aに配置された複 数のMEMSミラーのうちの制御対象となるMEMSミ ラーを選択し、そのMEMSミラーに対応した回路プロ ックにカウンタ制御信号を伝えるものである。このセレ クタ20の選択動作は、光パワー検出部12で検出され る光の出力チャネルに対応した入力チャネルに関する情 報が与えられることによって設定される。なお、MFM Sミラー駆動部14Bには、上記のようなセレクタ20 が設けられていないが、これは、光パワー検出部12で 検出される光の出力チャネルが決まると、それに対応す るMEMSミラーアレイ2BのMEMSミラーが1つに 特定されるためである。

【0071】各MEMSミラー駆動部14A, 14Bに 設けられるU/Dカウンタ21Xは、比較制御部13か らのカウンタ制御信号に従ってMEMSミラーのX軸方 向についてのカウンタ値を増加または減少させ、そのカ ウンタ値をD/A変換器22Xに出力する。D/A変換 器22Xは、U/Dカウンタ21Xからのデジタルで表 されたカウンタ値をアナログ値に変換してMEMSミラ 20 ードライバに出力する。また、U/Dカウンタ21V は、比較制御部13からのカウンタ制御信号に従ってM EMSミラーのY軸方向についてのカウンタ値を増加ま たは減少させ、そのカウンタ値をD/A変換器22Yに 出力する。D/A変換器22Yは、U/Dカウンタ21 Yからのデジタルで表されたカウンタ値をアナログ値に 変換してMEMSミラードライバに出力する。

【0072】なお、各U/Dカウンタ21X、21Yに は、ミラー調整速度の向上、すなわち、フィードバック 時間を短縮させるために、入出力チャネルに応じて予め 30 設定されたカウンタ初期値がそれぞれ与えられることが 望ましい。このカウンタ初期値の具体的な設定方法につ いては後述することにする。各MEMSミラー駆動部1 4A, 14Bに設けられるMEMSミラードライバ23 は、対応するMEMSミラーのX軸方向またはY軸方向 の角度を各々の軸方向に対応したカウンタ値に従って駆 動制御する信号を生成する。各MEMSミラー駆動部1 4A, 14Bで生成された駆動制御信号は、各MEMS ミラーアレイ2A、2Bの対応するMEMSミラーに与 えられて角度ずれの補正が行われる。

【0073】次に、第3実施形態の動作について説明す る。まず、出力光ファイバに結合された光信号のパワー と入力側および出力側の各MEMSミラーの角度との関 係について、図20の特性図を参照しながら概説する。 光信号変換器のミラー制御においては、出力光ファイバ に結合される光信号のパワーが最大、すなわち、光信号 変換器における光損失が最小になるように、入力側およ び出力側の各MEMSミラーの角度を最適化する必要が ある。ところで、上述の図45に示したような3次元型 示すように、出力光パワーが最大になるミラー角度の最 適点が、入力側および出力側の各MEMSミラーについ て出力光パワーがそれぞれ極大になる点で一致し、か つ、入力側のMEMSミラーの角度変化に対する出力光 パワーの変化と、出力側のMEMSミラーの角度変化に 対する出力光パワーの変化とが互いに依存することなく 独立の関係になるという特性が確認されている。

【0074】なお、図20には、各MEMSミラーのX 軸方向の角度を変化させたときの出力光パワーの変化の 様子を示したが、上記の特性は各MEMSミラーのY軸 方向の角度を変化させたときについても同様である。ま た、入力側MEMSミラーのX軸 (Y軸) 方向の角度と 出力側MEMSミラーのY軸 (X軸) 方向の角度とを変 化させたときの出力光パワーの変化特性も同様であり さらには、一方の側のMEMSミラーについてX軸方向 の角度とY軸方向の角度とを変化させたときに出力光パ ワーの変化特性も同様である。以下では、入力側および 出力側の各MEMSミラーのX軸方向の角度を変化(Y 軸方向の角度は固定)させた場合を想定して説明するこ とにするが、上記他の組み合わせについても同様にして 考えることが可能である。

【0075】例えば、図20 (A) のP1点に示すよう な出力光パワーが得られている状態では、まず、図20 (B) に示すように、出力側MEMSミラーの角度を周 定とし入力側MEMSミラーの角度を調整して出力光バ ワーが極大となるP2点の状態を実現する。 次に 図2 O (C) に示すように、入力側MEMSミラーの角度を 固定とし出力側MEMSミラーの角度を調整して出力光・ パワーが極大となるP3点の状態を実現する。これによ り、出力光パワーが最大になる (光信号変換器の光損失 が最小になる)最適点に各MEMSミラーの角度を制御 することが可能になる。

【0076】上記のような3次元型の光信号変換器につ いての制御特性を考慮して、第3実施形態の制御装置で は、例えば図21に示すような具体的な回路構成を比較 制御部13のカウンタ制御信号生成回路13Eおよび監 視制御回路13Fに適用して、各MEMSミラーの角度 ずれの補正制御が行われる。図21に示す具体例では、 カウンタ制御信号生成回路13Eの構成要素として極性 反転回路13E'が設けられる。また、監視制御回路1 3 Fについては、比較回路13Dでの比較結果を示す信 号が極性反転制御信号生成部30およびH/L検出回路 31にそれぞれ入力され、極性反転信号生成部30で生 成される極性反転制御信号が極性反転回路13E'に出 力される。H/L検出回路31では、比較回路13日か らの出力信号レベルが監視され、ハイレベルからローレ ベルへの変化が検出されると、それを知らせる信号がセ レクタ選択信号切替回路32に出力されるとともに、極 性反転回路13E'の動作を無効にするディセーブル信 の構成をもつ光信号変換器については、図20 (A)に 50 号が極性反転回路13E'に出力される。セレクタ選択

信号切替回路 3 2 では、 H/ L 検加回路 3 1 からの出力 信号に応じて出力光パワーが極大点に達したことが判断 されてセレクタ1 3 G を切り替える選択信号が生成さ れ、該選択信号がセレクタ1 3 G および初期立上げ回路 3 3 に送られる。初期立上げ回路 3 3 は、角度ずれ補正 制御の開始を合図する制御開始信号が入力されると、セレクタ1 3 G に対して初期値を与えるとともに極性反転 回路 1 3 E / の動作を有効にするイネーブル信号を出力 する。なお、初期立上げ回路 3 3 から極性反転回路 1 3 E / に与えられるイネーブル信号は、セレクタ選択信号 10 切替回路 3 2 からの出力信号に応じて出力状態が制御さ

【0077】上記のような回路構成を備えた比較制御部13では、例えば図22のタイミングチャートに示すように、まず、時間でいたがいて制御開始信号が初期立上げ回路33に入力されると、初期立上げ回路33に入りえば、カウンタ制御信号の初期値としてカウンタ値の増加を指示するカウンタリρ信号をセレクタ13Gに与えると同時に、極性反転回路13E'に対してイネーブル信号を与える。これにより各部の制御動作が開始される。なお、ここでは初期値としてカウンタリア信号をセレクタ13Gに与えるように設定したが、カウンタ値の減少を指示するカウンタDown信号を初期値として与えるように設定してもよい。

【0078】セレクタ13Gに与えられたカウンタUp信号は、各MEMSミラー駆動部14A、14Bに振り分けられ、MEMSミラー駆動部14Aに送られたカウンタUp信号は、さらにセレクタ20で振り分けられて角度ずれの制御対象となる入力側のMEMSミラーに対応した回路ブロックに送られる。また、MEMSミラー駆動部14Bに送られたカウンタUp信号は、角度ずれの制御対象となる出力側のMEMSミラー(光パワー検出部12で出力光パワーのモニタを行うチャネル)に対応した回路ブロックに送られる。ここでは、例えば前述応した回路ブロックに送られる。ここでは、例えば前述応した回路ブロックに送られる。ここでは、例えば前述応した回路ブロックに送られる。ここでは、例えば前途応した回路ブロックに送られる。ここでは、例えば前途の図20に示したように、MEMSミラーのX軸方向の角度ずれを入り側、出力側の順で補正制御する場合を考えることにすると、制御開始時には、比較制御部13からのカウンタUp信号が、MEMSミラー駆動部14AのX輪側のU/Dカウンタ21Xに入力されることになる。

【0079】カウンタUp信号の入力を受けたU/Dカウンタ21Xでは、予め与えられたカウンタ初期値が増加され、鉄カウンタ値が入る変換器22Xに出力されてD/A変換器25Xの出力信号がMEMSミラードライバ23に送られ、U/Dカウンタ21Xのカウンタ値に応じて入力側MEMSミラーのX軸方向の角度を制御する駆動制御信号が生成され、鉄駆動制御信号がMEMSミラーアレイ2Aに与えられる。これにより、入力側のMEMSミラーアレイ2Aの対応するMEMSミラーのX軸方の角度をMEMSミラーのX軸方向についての角度の対象するMEMSミラーのX軸方向についての角度50

が変化し、該入力側MEMSミラーおよびそれに対応する出力側MEMSミラーで反射された光信号の出力光ファイバに対する結合状態が変化する。そして、出力光ファイバに結合された光信号は、その一部が光力プラ11で分岐されて光パワー検出部12では、光カプラ11からのモニタ光が受光素子12Aで受光されて光パワーに応じた電流信号が発生し、1/V変換器12Bで電圧信号に変換されて比較制御部13に出力される。

【0080】出力光パワーのモニタ結果に応じた電圧信号は、比較削割部13のA/D変換器13Aでデジタル信号に変換されて比較回路13Dには、入力側MEMSミラーのX軸方向の角度を変化させる前の状態における出力光パワーに応じた電圧値がホールド回路13Cから与えられていて、A/D変換器13Aからの電圧値との比較が行われる。そして、入力側MEMSミラーのX軸方向の角度を変化させたことにより、出力光パワーが大きくなった場合には、比較回路13Dがパーレベルの出力信号を発生し、出力光パワーが小さくなった場合には、比較回路13Dがパーレベルの出力信号を発生する。

【0081】ここで、セレクタ13Gに初期値として与 えたカウンタUp信号により、出力光パワーが増大する 方向に変化した場合には、比較回路13Dからのハイレ ベルの出力信号に対してカウンタUp信号を生成し、ロ ーレベルの出力信号に対してカウンタDown信号を生 成するようにカウンタ制御信号生成回路13Eの動作設 定を行う必要がある。また、出力光パワーが減少する方 向に変化した場合には、比較回路13Dからのハイレベ ルの出力信号に対してカウンタDown信号を生成し、 ローレベルの出力信号に対してカウンタロロ信号を生成 するようにカウンタ制御信号生成回路13Eの動作設定 を行う必要がある。このようなカウンタ制御信号生成回 路13日の動作設定を実現するために、本実施形態で は、制御監視部13Fに極性反転信号生成部30が設け てあり、比較回路13Dからの出力信号がローレベルで あることが検出されると極性反転回路13E'を反転動 作させ、ハイレベルであることが検出されると極性反転 回路13日 を反転動作させないようにする極性反転制 御信号が生成されて極性反転回路13E'に送られる。 これにより、極性反転回路13E'が反転動作していな い設定では、カウンタ制御信号生成回路13Fの出カレ ベルが比較回路13Dからの出力信号のレベル涌りとな って、比較回路13Dのハイレベル出力に対してハイレ ベルのカウンタUp信号、比較回路13Dのローレベル 出力に対してローレベルのカウンタDown信号が出力 される。一方、極性反転回路13E'が反転動作してい る設定では、比較回路13Dのハイレベル出力に対して ローレベルのカウンタDown信号、比較回路13Dの

ローレベル出力に対してハイレベルのカウンタUp信号が出力されるようになる。

【0082】ここでは、初期値としてのカウンタUヵ何 号に対して、例えば図22の時間 t,~t,に示すよう に、比較回路13Dの出力信号がローレベルになったと すると、極性反転回路13日、を反転動作させるハイレ ベルの極性反転信号が発生する。これにより、初期値と してハイレベルのカウンタUp信号に設定されていたカ ウンタ制御信号が、時間 t2~t3に示すようにローレベ ルのカウンタDown債号に切り替えられ、セレクタ1 3G、20を介してMEMSミラー駆動部14AのU/ Dカウンタ21Xに送られる。そして、U/Dカウンタ 21 Xのカウンタ値の減少により、入力側MEMSミラ 一の角度が制御開始時とは逆方向に制御されて出力光パ ワーが増大する方向に変化するようになり、図22の時 間t:~t,に示すように、比較回路13Dの出力信号が ハイレベルとなる。この比較回路13Dのハイレベルの 出力信号は、極性反転回路13E'によって反転されて ローレベルのカウンタDown信号としてカウンタ制御 信号生成回路13Eから出力される。このようなカウン 20 タDown 信号に従って、出力光パワーが極大点に達す るまで(図20(B)参照)、入力側MEMSミラーの 角度調整が繰り返される。

【0083】出力光パワーが極大点に達するか、また は、極大点を超えると、図22の時間ts~taに示すよ うに、比較回路13Dの出力信号がローレベルに転じ る。この比較回路13Dの出力レベルのハイからローへ、 の変化は、制御監視回路13FのH/L検出回路31で 検出され、それを知らせる信号がセレクタ選択信号切替 回路32に送られるとともに、極性反転回路13E'に 30 与えられていたイネーブル信号が取り消されて、その代 わりにH/L検出回路31から極性反転回路13Eにデ ィセーブル信号が送られる。また、このとき極性反転信 号生成部30から出力されていた極性反転信号も取り消 される。そして、セレクタ選択信号切替回路32では、 H/L検出回路31からの信号の入力により、入力側M EMSミラーのX軸方向についての角度が最適な状態に 制御されたことが判断されて、ここではセレクタ13G の設定を入力側MEMSミラーのX軸方向から出力側M EMSミラーのX軸方向に切り替える制御信号が生成さ 40 れてセレクタ13Gに送られる。

【0084】なお、ここでは比較回路13Dの出力信号がローレベルに転じた時点で入力側MEMSラーのX軸方向の角度が最適化されたと判断するようにしたが、例えば、比較回路13Dの出力信号がローレベルに転じた時の制御サイグルでカウンタリで得ち上切りを入、次の制御サイクルで、比較回路13Dの出力信号がローレベルに転しる直前の状態となるように入力側MEMSラーの角度を戻すようにしてもよい。このような制御を行うか否 50

かは、角度制御の精度等に応じて判断することになる。 【0085】上記のようにして入力側MEMSミラーの X軸方向の角度制御が完了すると、次に、前述の図20 (C)に示したような出力側MEMSミラーのX軸方向 の角度制御が入力側MEMSミラーの場合と同様にして 行われ、出力光パワーが最大になる最適点に各MEMS ミラーのX軸方向の角度が制御される。さらに、各ME MSミラーのY軸方向の角度についても、X軸方向の場 合と同様にして出力光パワーが最大となるように制御を 行うことで、各MEMSミラーの角度が最適化される。

24

行うことで、各MEMSミラーの角度が最適化される。 これにより、光信号交換器の光損失を最小にすることが 可能になる。

【0086】なお、上記第3実施形態では、入力側MEMSSミラーのX軸方向、出力側MEMSミラーのX軸方向、回りに発生を制御するようにしたが、出力側MEMSミラーの角度制御を先に行うことも可能である。また、X軸方向の角度制御を行った後にY軸方向の角度制御を行うようにしたが、Y軸方向の角度制御を先に行うようにしてもよい。さらに、一方の側のMEMSミラーについて各軸方向の角度制御を行った後に、他方の側のMEMSミラーについて各軸方向の角度制御を行ったとも可能である。本発明における角度制御の順序は、前述の図20で説明したように、出力光パワーの変化が各MEMSミラーおよび各軸方向ごとは独立であるため、任意に設定することが可能である。

【0087】また、上記第3実施形態では、出力光パワーが権大点に達するまでMEMSミラーの角度制御を続けるようにしたが、例えば、出力光パワーが予め設定した値を超えた時点で制御を止めるようにすることも可能である。図23は、上記の場合の比較制御部13およびMEMSミラー駆動部14A、14Bの構成例を示したものである。図23の構成例では、人D変換器13Aから出力される電圧値を比較結果監視部13Hで直接読み取り、比較回路13Dにおける比較結果とは関係なく、電圧値が一定値を超えたらカウンタの動作を停止させるようにしたものである。

【0088】 次に、本実施形態の第4実施形態にかかる 光信号交換器の制御装置について説明する。上述した第 3実施形態では、各MEMSミラーについて一方の魅力 0 向について角度制御を行い、その制御が完了した後に、 他方の軸方向の角度制御を行うようにした。第4実施形態では、入力側および出力側の各MEMSミラーについ て同一軸方向の角度を同時に制御し、処理時間の短縮を 図るようにした場合を考える。

【0089】図24は、第4実施形態における比較制御 部13の具体的な構成例を示すプロック図である。な お、光信号交換器および制御装置の全体構成は、上述の 図18に示した第3実施形態の場合と同様であり、ま た、光パワー検出部12および各MEMSミラー駆動部 14A、14Bの構成は、上述の図19に示した具体例 の場合と同様である.

【0090】図24において、第4実施形態の比較制御部13は、図19および図21に示した第3実施形態の構成について、カウンタ制御信号生成回路13日とカウンタ制御信号生成回路13日とカウンタ制御信号生成回路13日に比較信号受信回路131が設けられる。また、制御監視回路13Fについては使し極信号生成部30に代えて、メモリ34およびCPU35が設けられる。

【0091】制御監視回路13Fのメモリ34は、A/D変換器13Aから出力される電圧値を記憶し、その記憶を力がCPU35によって読み出される。CPU35によし、後述するようにメモリ34の記憶データ並びにH/L検出回路31および初期立上げ回路からの信号に基づいて各部の動作を制御する。ここで、上記のような構成を有する比較削御部13の動作を図25のフローチャートを参照しながら説明する。

【0092】比較制御部13では、まず、図25のステップ10およびスラップ20個中、S10およびSラップ20個中、S10およびS2ので示し、以下同様とする)において、角度制御を行う輸方向を設定するためのセレクタ13Gの出力遊択が行われる。ここでは、最初にX軸方向の角度制御を行った後に、Y軸方向の角度制御を行う場合を想定することにする。

【0093】各MEMSミラーのX軸方向についての角 度制御を行うためのセレクタ13Gの出力選択が行われ ると、ステップ30では、制御開始時の初期状態を基準 に、カウンタ制御信号の初期値として、入力側MEMS ミラーに対しカウントUp信号、出力側MEMSミラー に対しカウントUp信号(以下、このようなカウンタ制 30 御信号の組み合わせを(U,U)と表記する)が初期立 上げ回路33から出力される。そして、カウンタ制御信 号(U, U)は、セレクタ13Gを介して各MEMSミ ラー駆動部14A、14BのU/Dカウンタ21Xに与 えられ、上述した第3実施形態の場合と同様にして、入 力側および出力側の各MEMSミラーのX軸方向の角度 が制御されて、その時の光パワー検出部12で検出され る出力光パワーに対応した電圧値がメモリ34に記憶さ れる。カウンタ制御信号(U. U)に対する電圧値がメ モリ34に記録されると、各MEMSミラーの角度が初 期状態に戻され、入力側MEMSミラーに対しカウント Down信号、出力側MEMSミラーに対しカウントD own信号(以下、このようなカウンタ制御信号の組み 合わせを(D, D)と表記する)が、カウンタ制御信号 の初期値として与えられ、その時の出力光パワーに対応 した電圧値がメモリ34に記録される。さらに、上記の 場合と同様にして、初期状態を基準にカウンタ制御信号 (U, D) およびカウンタ制御信号 (D, U) が順次与 えられ、それぞれの場合における出力光パワーに対応し た電圧値がメモリ34に記録される。

【0094】各カウンタ制御信号 (U, U) (D, D) (U, D) (D, U) に対応した電圧値がメモリ34に 記憶されると、ステップ40において、CPU35に リメモリ34の記憶データが読み込まれ、出力光パワー が最も大きくなる時の電圧値の検出が行われ、そのとき のカウンタ制御信号の組み合わせが判断される。ここで のカウンタ制御信号の組み合わせが判断される。ここで パワーが最も大きくなった場合を考えることにする。

[095] そして、ステップ50では、CPU35の) 判断結果に従って、カウンタ制御信号生成回路13Eで生成されカウンタ制御信号が(D、10 の組み合わせに設定されるとともに、比較信号受信回路13Iの動作を有効にするイネーブル信号がCPU35から出力され、前述した第3実施形態の場合と同様にして、比較回路13Dからの出力信号がハイレベルであるかローレベルかの判定が行われ、ローレベルが判定される(極大検出)とステップ70に移る。なお、ローレベルが判定されたときの状態は、入力側および出力側の各MEMSミラーのうちの一方の角度が最適点に達したことを意味する。

【0096】ステップ70では、比較回路13Dからの 出力信号のハイレベルからローレベルへの変化がH/L 検出回路31により検出され、それを知らせる信号がC PU35に伝えられる。H/L検出回路31からの信号 を受けたCPU35では、比較信号受信回路13Iへの イネーブル信号の出力を取り消して比較信号受信回路1 310動作を停止させるとともに、セレクタ選択信号切 特回路32を介して制御信号を送りセレクタ13Gの動 作を停止させる。

【0097】次に、ステップ80では、入力側および出 カ側の各MEMSミラーについて、一方の側のMEMS ミラーに対してカウンタUp信号およびカウンタDow n信号を順に与え、各々の場合における出力光パワーに 対応した電圧値がメモリ34に記憶される。また、一方 の側のMEMSミラーについての電圧値の記憶が完了す ると、他方の側のMEMSミラーに対してカウンタUp 信号およびカウンタDown信号を順に与え、各々の場 合における出力光パワーに対応した電圧値がメモリ34 に記憶される。このような操作を行う理由は、例えば、 入力側MEMSミラーの角度が最適点に達していれば、 入力側MEMSミラーに対してカウンタUp信号および カウンタDown信号を与えることで得られる出力光パ ワーの各値は、操作前の値よりも下回ることになる。一 方、出力側MEMSミラーに対してカウンタUp信号お よびカウンタDown信号を与えることで得られる出力 光パワーの値は、一方のカウンタ制御信号を与えたとき に上回り、他方のカウンタ制御信号を与えたときに下回 ることになる。従って、この差異に着目することで最適 50 点に達していないMEMSミラーが判別可能になる。

【0098】そこで、ステップ90では、CPU35に よりメモリ34の記憶データが読み込まれ、出力光パワ ーがステップ80の操作前の値を上回ったときのMEM Sミラーおよびカウンタ制御信号が判断される。このC PU35の判断結果に従って、ステップ100では、比 **較信号受信回路13** I にイネーブル信号が与えられると 同時に一方の側のMEMSミラーの角度が制御され、比 較回路13Dからの出力信号レベルの判定がステップ1 10で行われる。比較回路13Dからの出力信号がロー レベルになったことが検出されると(極大検出)、前述 10 のステップ70と同様にしてステップ120で、比較信 号受信回路 1 3 I およびセレクタ 1 3 G の動作が停止さ れる。そして、ステップ130では制御済みの軸方向の 判別が行われ、X軸方向のみの制御が完了している場合 には、ステップ20に戻って各MEMSミラーのY軸方 向についての角度制御が、X軸方向の場合と同様にして 行われる。

【0099】上記のように第4実施形態によれば、入力

側および出力側の各MEMSミラーについて同一軸方向 の角度を同時に制御するようにしたことで、各MEMS 20 ミラーについての角度制御時間を短縮させることが可能 になる。なお、上記第4実施形態では、各MEMSミラ 一のX軸方向の角度を同時に制御して一方の側のMEM Sミラーの角度が最適点に達した後は、他方の側のME MSミラーについてのみ角度制御を行うようにしたが、 一方の側の角度が最適化された後も、引き続き入力側お よび出力側の角度を同時に制御することも可能である。 具体的には、例えば、カウンタ制御信号(D. U)によ り角度制御を行い、一方の側のMEMSミラーの角度が 最適点に達した場合を考えると、その後のカウンタ制御 30 信号の組み合わせとしては (U, U) または (D. D) 、すなわち、これまで与えてきたカウンタ制御信号 の組み合わせ(D, U)とその逆の組み合わせ(U, D) を除いたカウンタ制御信号を与えるようにする。そ して、出力光パワーが大きくなる側のカウンタ制御信号 の組み合わせを判別して角度制御を続け、比較回路の出 力信号がローレベルに転じて再び極大点が検出された ら、一旦制御を止め、これまで与えてきたカウンタ制御 信号とその逆を除いた組み合わせを与えて、上記の場合 と同様の角度制御を繰り返し、最終的には、カウンタ制 40 御信号の組み合わせを変えても出力光パワーが大きくな らない極大点に達するまで角度制御を続けるようにす る。このような制御方式においても、入力側および出力 側の角度制御が同時に行われるため、処理時間の短縮を 図ることが可能である。

【0100】また、上記第4実施形能では、入力側および出力側の各MEMSミラーについて同一軸方向の角度を同時に制御するようにしたが、本発明はこれに殴らず、一方の側のMEMSミラーについてX軸方向およびY軸方向の各角度を同時に制御することも可能である。

さらに、入力側および出力側の各MEMSミラーについてX軸方向およびY軸方向の各角度をそれぞれ同時に削削側し、各々の組み合わせに対応した状態で得られる形がフーを逐次メモリに記憶し、該メモリの記憶データから最大値を抽出し、その条件にあったカウンタ制御信号を設定して角度制御を行うようにすることも応用可能である。

28 .

【0101】図26は、上記の場合の比較制御部13およびMEMSミラー駆動部14A,14Bの構成例を示したものである。図26の構成例では、比較制御部13として、A/D変換器13Aから出力される電圧値を記憶する光出力保存メモリ13Jと、各MEMSミラー駆動部14A,14Bのカウント動作を制御するカウンタ制御回路13Kと、光出力保存メモリ13Jの記憶データを基にカウンタ制御回路13Lの動作を制御するCPU13Lとが設けられる。

【0102】上記のような構成では、まず、制御開始時 の初期状態における出力光パワーに対応した電圧値を光 出力保存メモリ13Jに記憶する。初期状態の電圧値の 記憶が終了すると、それを知らせる信号がCPU13L に通知され、CPU13Lがカウンタ制御回路13Lの 動作を制御する。カウンタ制御回路13Lでは、各ME MSミラー駆動部14A、14Bの各々のU/Dカウン タ21X, 21Yのカウンタ値を、例えば、予め設定し た範囲内で動かすような制御が行われ、1カウント動か すごとに得られる出力光パワーに対応した電圧値が光出 力保存メモリ13.」に逐次記憶される。各カウンタ値に 対応した電圧値の記憶がすべて終了すると、CUP13 しでは、光出力保存メモリ131の記憶データが解析さ れ、出力光パワーが最大になるときのカウンタ値の条件 が検出される。そして、その条件に従って各U/Dカウ ンタ21X, 21Yのカウンタ値が設定され、入力側お よび出力側の各MEMSミラーの角度が最適点に制御さ れる。

【0103】ここで、前述した第3および第4実施形態 において、各MEMSミラー駆動部14A, 14Bの各 々のU/Dカウンタ21X,21Yにそれぞれ与えられ るカウンタ初期値について詳しく説明する。前述したよ うに、第3および第4実施形態では、入出力チャネルに 応じて予め設定したカウンタ初期値を各U/Dカウンタ 21X, 21Yにそれぞれ与えて、ミラー調整速度の向 上を図ることが望ましい。具体的には、例えば図27に 示すように、カウンタ初期値をメモリ40等に格納して おき、外部から与えられる入出力チャネル情報に従っ て、入出力チャネルに対応した初期値をメモリ40から 読み出すような構成が可能である。また、カウンタ初期 値としては、入力側のMEMSミラーおよび出力側のM EMSミラーについて実際に想定され得る傾斜角度を、 入出力チャネルのあらゆる組み合わせに対応させて設定 50 しておくことが最適である。

【0104】ところで、上記のようにメモリ40等に格 納されるカウンタ初期値のデータとしては、入力チャネ ル情報と、出力チャネル情報と、入力側および出力側の 各MEMSミラーについての2軸の傾斜角度情報とが必 要であり、そのデータの組み合わせとして((入力チャ ネル数)×(出力チャネル数)} 行数のテーブルを用意 する必要がある。しかも、各軸の傾斜角度情報として は、例えば、入力チャネル数および出力チャネル数がと もに64の場合(以下、64ch×64chとする)、 実際に想定される角度から見積もると、9~10ビット のデータ変換が要求される。このため、入力側お上び出 力側の各2軸についての傾斜角度情報として40ビット 程度が必要になる。従って、64ch×64chの場合 にカウンタ初期値を格納するためのメモリとしては、6 4×64×「6 (入力チャネル情報) +6 (入力チャネ ル情報) + 40 (傾斜角度情報) } ビット、すなわち、 約2 ピットの容量が必要となる。このメモリ容量は、 入出力チャネル数が倍になると、約7~8倍が要求され るようになるため、多チャンネル化が行われることで、 メモリ容量の肥大化とそれに伴う処理速度の低下が生じ てしまい、ミラー調整速度に影響を及ぼす可能がある。 【0105】そこで、以下では、入力側および出力側の 各MEMSミラーの光学的特性を利用することにより、 カウンタ初期値を格納するメモリの構成を最適化するた めの技術について詳しく説明する。まず、各MEMSミ ラーアレイ 2 A. 2 B について、各々のM EMS ミラー に対し、図28に示すような順番で対称に番号を割り振 るようにする。すなわち、3次元的に線対称となるよう に配置された各MEMSミラーアレイ2A、2Bが、そ れぞれ、M行N列に配列されたM×N個のMEMSミラ 30 ーを有する場合に、その線対称の軸を基準して、入力側 および出力側の各MEMSミラーの番号が対称とかろよ うに、上段の第1行から下段の第M行まで連続番号を割 り振るようにする。

【0106] 具体的には、入力側のMEMSミラーアレイ2Aについては、図で左上を起点にして行番号1~ M、列番号1~Nを振り、第1行・第1列のMEMSミラーをN番、第1行・第1列のMEMSミラーを1番、第1行・第1列のMEMSミラーをN番、第2行・第1列のMEMSミラーを2×N番とし、以降同様にし 40 で連続番号を振り、第M行・第N列のMEMSミラーアレイ2Bについては、図で右上を起点にして、入力側の場合と同様に各MEMSミラーに対して1番からM×N番までの連続番号を振るようにする。

【0107】なお、入力側の各MEMSミラーに振られた番号および出力側の各MEMSミラーに振られた番号は、後述する入出力チャネル情報を基に示される入力チャネル番号およびカチャネル番号にそれぞれ対応するものとする、図29は「加郷店メモリの機両を基準ルナ

るための第1の回路例を示すプロック図である。

【0108】図29において、第1の回路例は、前述の図27に示したカウンタ初期値を格納するメモリ40に対して、入力Cト検出回路41、出力Cト検出回路42、剰余減算回路43および整分減算回路44によって入出力チャネル情報を基に生成したアクセス信号を与え、メモリ40に格納する初期値データの削減を図ったものである。

【0109】入力C h 検出回路41は、外部等から与えられる入出力チャネル情報を基に、制御対象となる入力側のMEMSミラーに対応した入力チャネル番号を検出し、その検出結果を剥余貧真回路43および差分積算。 路44にそれぞれ出力する。また、出力C h 検出回路42は、入出力チャネル情報を基に、制御対象となる出力側のMEMSミラーに対応した出力チャネル番号を検出し、その検出結果を差分貧真回路44に出力する。

[0111]上記のような回路構成では、例えば図30に示すような入出力側の各MEMSミラーの光学的特性を利用することによって、初期値メモリの構成の最適化が実現されることになる。なお、図30の一例では、入出力チャネル数が64ch×64chの場合を考え、入出力側の各MEMSミラーアレイ2A,2Bが、8行8列に配列された64個のMEMSミラーをそれぞれ有するものとする。

るものとうの。
【0112】図30に示した各MEMSミラーの光学的特性とは、入力チャネル番号を線対称軸に垂直な方向(行方向)に並べられたMEMSミラーの数(列の数)で割った赤りと、入力チャネル番号の差と、がそれぞれ一致するような入出力チャネル番号の差と、がそれぞれ一致するような入出力チャネルの組み合かせの場合には、入力側および出力側の各MEのMSミラーの傾斜角度が同一になるという、3次元的に線対称な各MEMSミラーアレイ2人,2日の配置に基づいた光学特性である。上記のような入出力チャネルの関係は、入力チャネル番号はよび出力チャネルの手り。2つの組み合わせを(i1, j1)、(i2, j2)とすると、次の(11)式および(12)式で表される

[0113]  $i 1 = i 2 + N \times n \cdots (11)$  $i 1 - j 1 = i 2 - j 2 \cdots (12)$ 

ャネル番号および出力チャネル番号にそれぞれ対応する ただし、Nは列の数(図30の例では8)であり、nは ものとする。図29は、初期値メモリの構成を最適化す 50 任意の整数である。(11)式および(12)式の関係

を同時に満たす入出力チャネルの組み合わせは、 具体的 には図30に例示したように、入力チャネル番号につい ての剰余が1となり、入出力チャネル番号の差分が9と なる。(1, 10)、(9, 18)、…(49, 58) などのグループを挙げることができる。外部からの入出 カチャネル情報に従って上記のようなグループに該当す る入出力チャネル番号が与えられた場合には、それに対 応する入力側および出力側の各MEMSミラーの傾斜角 度がすべて同一となる。このため、入力チャネル番号に ついての剰余と、入出力チャネル番号間の差分とを基準 にして関連付けを行い、メモリ40に格納するカウンタ 初期値のデータテーブルを作成することによって、メモ リ構成の最適化を図ることが可能になる。

【0114】次の表1は、図30に示したような64c h×64chの場合に、入出力チャネル番号に関する剰 余および差分を基準にして作成した、カウンタ初期値の データテーブルの一例である。

[0115]

【表1】

	索索	差		BAY		
	1	-63	A	B	C-61	D-43
			:			:
_ [	1	+56	A.,,	B+16	C+1.	D+10
ı	2	-62	E-sa	F-41	G	H
- 1		:				:
- 1	2	+57	E.50	F +50	G+50	H.,,
- 1	:	:	:	: .	:	:
ļ	-:-	_:_	:	:	:	_ :_
ļ	8 (0)	-56	W-sa	X-AL	Y	Z-46
ŀ			Li	:	:	
L	8 (0)	+63	W+63	X+42	Y+62	Z+62

【0116】図29に示した回路構成では、上記表1に 30 示すようなカウンタ初期値のデータテーブルがメモリ4 0に格納され、入出力チャネル情報に従って入力 Ch検 出回路41および出力Ch検出回路42で検出された入 カチャネル番号および出力チャネル番号を用いて、剰余 演算回路43および差分演算回路44により剰余および 差分がそれぞれ演算され、それら演算結果に従ってメモ リ40の初期値データが読み出されるようになる。

【0117】このような回路構成を適用することによ… り、メモリ40に必要とされるメモリ容量は、本回路構 成を適用しない図27に示したような構成の場合に比べ 40 て、約2/N相当に軽減することが可能になる。具体的 には、上記表1の一例において、メモリ40に格納され る初期値データは960通りとなる。一方、本回路構成 を適用せずに64ch×64chの制御を行う場合に は、4096通りの初期値データをメモリ40に格納す る必要が生じる。

【0118】また、上記図29に示した第1の回路例に ついては、図31に示すような改良を施すことによっ て、初期値メモリの構成をより最適化することが可能で 回路45を設けたものである。この0検出回路45は、 差分演算回路44の演算結果が0になる場合を検出し、 その検出結果をメモリ40に伝えるものである。

【0119】 差分演算回路44の演算結果が0にかる場 合、すなわち、入力チャネル番号と出力チャネル番号と が同じ場合には、本光信号交換器の構成上、入力側のM EMSミラーおよび出力側のMEMSミラーの各傾斜角 度が共に0となり、各々のミラーの駆動電圧もそれぞれ 0となる。そこで、このような場合を0検出回路45を 用いて検出してメモリ40に伝えるようにすることで、 入出力チャネル番号が同じという条件に対してメモリ4 0 のテーブルをさらに簡略化することができる。これに より、64ch×64chの場合には、7.通りの初期値 データの削減が可能になり、953通りの初期値データ をメモリ40に格納すればよくなる。

【0120】なお、図31の回路構成では、入出力チャ ネル番号が同一になるときの初期値データをメモリ40 に用意しておくようにしたが、例えば図32に示すよう に、0検出回路45から各MEMSミラー駆動部14 20 A, 14Bの各々のD/A変換器22X, 22Yにリセ ット信号をそれぞれ与えるようにしても構わない。次

に、初期値メモリの構成を最適化するための第2の回路 例について説明する. 【0121】前述した第1の回路例では、入出力チャネ

ル番号に関する剰余と差分を基準にして関連付けを行 い、初期値データの削減を図るようにした。第2の回路 では、3次元的に線対称な各MEMSミラーアレイ2 A. 2Bの配置において、2組の入出力チャネル番号 (i1, j1)、(i2, j2)の間に、i1=j2, i 2=j1の関係がある場合、入力側および出力側の各 MEMSミラーの傾斜角度について、次の表2に示すよ うな関係が成り立つことを利用して関連付けを行い、メ モリ構成の最適化を図るようにしたものである。

[0122] 【表2】

入力チャネル	出力チャネル	0 AX	PAT	θ <sub>PX</sub>	θ <sub>BY</sub>
i 1	J 1	A	В	C	D
1 2	J 2	-c	-D	-A	-в

【0123】表2にあるように、2組の入出カチャネル 番号(i1, j1)、(i2, i2)に関して、入力側 および出力側の各MEMSミラーの各軸方向に与える傾 斜角度は、4つの角度A、B、C、Dの組み合わせとし て考えた場合に、各傾斜角度  $\theta_M$  .  $\theta_M$  ,  $\theta_M$  ,  $\theta_M$  と の対応関係を並べ替え、符号を反転させた (絶対値が同 じ)ものとなる。このような関係を利用することによっ て、メモリ40に格納する初期値データを削減すること が可能にかる.

【0124】図33は、第2の回路例を示すブロック図 である。図33において、第2の回路例は、前述の図2 ある。図31の改良例は、第1の回路例について0検出 50 7に示したカウンタ初期値を格納するメモリ40に対し て、入力Ch検出回路41. 出力Ch検出回路49およ び大小比較/ソート回路46によって入出力チャネル情 報を基に生成したアクセス信号を与え、さらに、メモリ 40から読み出した初期値をソート/符号反転回路47 で処理して各MEMSミラー駆動部14A、14Bに送 るようにしたものである。

【0125】大小比較/ソート回路46は、入力Ch検 出回路41で検出された入力チャネル番号iと出力Ch 検出回路 4 2 で検出された出力チャネル番号 i との大小 比較を行い、入出力チャネル番号を示す情報としてメモ 10 リ40に与えるアクセス信号の上位側にチャネル番号の 大きい方がくるように並べ替えを行うための回路であ る。

【0126】この大小比較/ソート回路46は、具体的 には、例えば図34に示すように、EX-OR回路46 A. AND回路46Bおよびラッチ回路46Cを組み合 わせた回路によって、入力チャネル番号iと出力チャネ ル番号jの大小比較を行い、その比較結果に基づいて2 ×2マトリックススイッチ46Dによりチャネル番号の 並べ替えを行うようにすることが可能である。なお、ラ ッチ回路46Cは、2×2マトリックススイッチ46D に対して、入力チャネル番号 i が出力チャネル番号 j よ り大きい場合に入出力ポートの接続をバー状態にする信 号を与え、入力チャネル番号;が出力チャネル番号;ト り小さい場合に入出力ポートの接続をクロス状態にする 信号を与える。また、ラッチ回路46℃から出力される 大小比較の結果を示す信号は、後段のソート/符号反転 回路47にも送られる。

【0127】ソート/符号反転回路47は、大小比較/ ソート回路 4 6 からのアクセス信号に従ってメモリ 4 0 30 から読み出された初期値データ(傾斜角度)が入力さ れ、大小比較/ソート回路46でi>iの大小関係が検 出された場合には、メモリ40からの初期値データをそ のまま各MEMSミラー駆動部14A、14Bの各々の U/Dカウンタ21X,21Yに出力し、大小比較/ソ ート回路46でiくjの大小関係が検出された場合に は、メモリ40からの初期値データを前述の表2に示1. たような関係に対応させて並べ替えて符号反転した後 に、各MEMSミラー駆動部14A. 14Bの各々のII /Dカウンタ21X,21Yに出力する。

【0128】このソート/符号反転回路47は、具体的 には、例えば図35に示すように、メモリ40から読み 出された傾斜角度データ $\theta$ <sub>K</sub> ,  $\theta$ <sub>E</sub> および $\theta$ <sub>K</sub> ,  $\theta$ <sub>F</sub> を 2×2マトリックススイッチ47Aおよび47Bでそれ ぞれ受け、i<jの大小関係が検出された場合に、各2 ×2マトリックススイッチ47A, 47Bの入出力ポー トの接続をクロス状態にして、 $\theta$  u と  $\theta$  u の並べ替えお よびθ м と θ m の並べ替えを行う。そして、各2×2マ トリックススイッチ47A、47Bから出力された各傾

ぞれ送られ、i < i の場合に各傾斜角度データの符号が 反転される。そして、符号反転回路47℃から出力され る各傾斜角度データが、各MEMSミラー駆動部14 A. 14BのU/Dカウンタ21Xにそれぞれ送られ、 符号反転回路47Dから出力される各傾斜角度データ が、各MEMSミラー駆動部14A,14BのU/Dカ ウンタ21Yにそれぞれ送られる。

【0129】上記のような第2の回路例を適用すること により、メモリ40に必要とされるメモリ容量を、本回 路構成を適用しない図27に示したような構成の場合に 比べて半減させることが可能になる。次に、初期値メモ リの構成を最適化するための第3の回路例について説明

【0130】第3の回路では、3次元的に線対称な各M EMSミラーアレイ2A,2Bの配置において、2組の 入出力チャネル番号 (i 1, j 1)、(i 2, j 2) の 間に、次の(13)式~(15)式の関係が同時に成り 立つ場合、入力側および出力側の各MEMSミラーの傾 斜角度について、次の表3に示すような関係が成立する ことを利用して、メモリ構成の最適化を図るようにした ものである.

[0131]  $i 2 = i 1 + N \times n \cdots (13)$  $i \ 2 = i \ 1 - N \times n \ \cdots \ (1 \ 4)$ -N<i1-i2<N ... (15) ただし、Nは列の数、nは任意の整数とする。 [0132] [表3]

×	31					
	入力チャネル	出力チャネル	PAX	θ <sub>AY</sub>	θ <sub>BX</sub>	0 py
	11	j 1	A	В	c	D
	12	J 2	Α	-в	c	-D

【0133】図36は、上記表3の関係を具体的に示し た例示図である。図36では、入出力チャネル数が64 ch×64chの場合を考え、入出力側の各MEMSミ ラーアレイ2A.2Bが、8行8列に配列された64個 のMEMSミラーをそれぞれ有するものとしたとき、上 記表3の関係が成り立つ組み合わせの1つとして、例え (i, (i, j, 1)) = (1, 5, 1), (i, 2, i, 2) =(49.3)を想定している。このような入出力チャネ ルにおいては、入力側および出力側の各MEMSミラー の傾斜角度について、絶対値が各軸方向で同じになり、 その符号がY軸方向で反転した関係が成り立つようにな る。このような関係を利用することによっても、メモリ 40に格納する初期値データを削減することが可能にな

【0134】図37は、第3の回路例を示すブロック図 である。図37において、第3の回路例は、前述の図2 7に示したカウンタ初期値を格納するメモリ40に対し て、入力Ch検出回路41、出力Ch検出回路42、組 み替え回路48および大小比較回路49によって入出力 斜角度データは、各符号反転回路47C,47Dにそれ 50 チャネル情報を基に生成したアクセス信号を与え、さら

に、メモリ40から読み出した初期値を、その一部を符 号反転回路50A,50Bで処理して各MEMSミラー 駆動部14A,14Bに送るようにしたものである。

【0135】組み替え回路48は、大小比較回路49によって比較される入出力チャネル番号間の大小関係に応じて、前述の(13)式へ(15)式の関係に従い、入力チャネル番号iおよび出力チャネル番号jの組み替えを行うものである。この組み替え回路48は、具体的には、例えば図38に示すように、セレクタ48A、48B、高・剰余算出回路48C、48Dおよび演算回路4108E、48Fを組み合わせて構成することが可能である。

【0136】図38の回路構成では、大小比較回路49 における比較結果が i > j を示す場合、チャネル番号の 組み替えを必要としない設定になっていて、入力Ch検 出回路41および出力Ch検出回路42から送られてく る入力チャネル番号iおよび出力チャネル番号iが、そ のまま各セレクタ48A、48Bを介してメモリ40に 伝えられる。一方、大小比較同路49における比較結果 がi<iを示す場合には、入力チャネル番号iおよび出 カチャネル番号 i について、商・剰余簋出同路480 48Dで、チャネル番号を列の数Nで割ったときの商お よび剰余がそれぞれ算出される。入力チャネル番号iに ついて商・剰余算出回路48Cで算出された、商は演算 回路48Fに出力され、剰余は演算回路48Eに出力さ れる。また、出力チャネル番号iについて商・剰余算出 回路48Dで算出された、商は演算回路48Eに出力さ れ. 剰余は演算回路48Fに出力される。そして、各演 算回路48E, 48Fでは、与えられた商および剰余を 用いてチャネル番号の再計算が行われ、演算回路48E 30 の再計算結果が組み替え後の入力チャネル番号としてセ レクタ48Aを介してメモリ40に送られ、演算回路4 8 Fの再計算結果が組み替え後の出力チャネル番号とし てセレクタ48Bを介してメモリ40に送られる。

【0137】上記のような組み替え回路48における処理動作は、前述の図36に例示したような64ch×64ch×64ch×6場合には、例えば図39に示すように、組み替え前の入力チャネル番号 11および出力チャネル番号 12として、組み42時で、21よな出力チャネル番号 2として、組み40替え前の各データの上位3ビットを互いに入れ替えた6ビットデータを作成することになる。このようなデータ処理を実行する組み替え回路48は、論理回路の組み合わせにより容易に実現可能である。

【0138】 符号反転回路50Aは、組み替え回路48 から出力される入出力チャネルデータに従ってメモリ4 0から読み出された傾斜角度のうち、入力側のMEMS ミラーのY軸方向に対応した傾斜角度θπが入力され、 大小比較回路49における比較結果がi>jを示す場合 にはそのままの傾斜角度θπを、比較結果がi<j。 す場合には符号を反転させた傾斜角度θπ をMEMSミラー駅動都14 A00 U/DD ンタ217(比透る。また、符号反転回路50 Bは、組み替え回路48から出力される入出力チャネルデータに従ってメモリ40から読み出された傾斜角度のうち、出力側のMEMSミラーのY軸方向に対応した傾斜角度θπが入力され、大小比較回路49における比較結果がi>jを示す場合にはそのままの傾斜角度θπを、比較結果がi<jを示す場合には符号を反転させて傾斜角度θπを断断Sミラー駆動部14BのU/Dカウンタ21Y(送る。

[0139] 上記のような第3の回路例を適用することによって、メモリ40に必要とされるメモリ発量を、本 回路構成を適用しない図27に示したような構成の場合 に比べて半減させることが可能になる。次に、初期値メ モリの構成を最適化するための第4の回路例について説 明する。

【0140】上述した第1~第3の回路例では、2組の入出力チャネル番号(i1、i1)、(i2, j2)に入まれる場所では、2組のはいた、対応する各所医別をラーのを持ち向の傾角度の相対関係を基にメモリ構成の最適化を図ってきた。第4の回路例では、カウンタ初別値の構度に対するるよいと軟的散しくなく、かつ、メモリ客量に制限があるような場合に、1組の入出力チャネル番号(i1、j1)について、i1とj1との間の列差または行差を基準にして補正角度を考えることで、メモリ構成の最適化を図るようにしたものである。具体的には、例えばi1とj1が同じ行に位置する場合に、i1とj1の間の列差に着立すると、次の要4および表言に示すような既係が成立することを利用したものである。

#### [0141]

1

表	41					
	入力チャネル	出力チャネル	9 AX	θ <sub>AY</sub>	θ <sub>nx</sub>	B BY
	11	J 1	Α	В	-A	В

# 【0142】 【表5】

# - (N-1) - (N-1) × a - (N-1) - (N-1) × a - 1 - a 0 0 0 1 a : N-1 (N-1) × a

【0143】表4にあるように、i1とj1が同じ行に 位置する場合、入力側および出力側の各MEMSミラー の Y軸方向の傾斜角度 $\theta$   $\alpha$  ,  $\theta$   $\alpha$  は同じ値目になり、X 鞋方向の傾斜角度 $\theta$   $\alpha$  ,  $\theta$   $\alpha$  は絶対値が同じで符号が異なる値A, $\alpha$  Aとなる。そして、X軸方向の傾斜角度 $\theta$   $\alpha$  ,  $\theta$   $\alpha$  の絶対値Aは、表5にあるように、 $\alpha$  を基準の 補正角度として列差に依存した線形関係を持つようになる。

【0145】上記のような関係は、i1とj1が同じ列 10に位置し、i1とj1の間の行逐に着目する場合にも同様にして考えることができる。後でて、このような関係を利用することによって、メモリ40に格納する初期値データを大幅に減らすことが可能になる。図41は、第4の国路例を示すプロック図である。

【0146】図41において、第4の回路例は、前述の図27に示したカウンタ初期値を格納するメモリ40に 対して、入力Ch 検出回路41、出力Ch 検出回路42 および行列差演算回路51によって入出力チャネル情報 を基に生成したアクセス信号を与え、さらに、メモリ4 0から読み出した初期値を、その一部を符号反転回路5 2A, 52Bで処理してそのMEMSミラー駆動部14 A、14Bに送るようにしたものである。

【0147】行列差演算回路51は、入力Ch検出回路41で検出された入力チャネル番号と出力Ch検出回路41で検出された出力チャネル番号と出力Ch検出回路42や検出された出力チャネル番号に造って、入出力チャネル間の列差または行差を演算し、その演算結果をアクセス信号としてメモリ40に集みえるものである。この行列差演算回路51は、具体的には、例えば図42に示すように、商・剰余算出回路51A、51Bおよび演算30回路51C、51Dを組み合わせて構成することが可能である。

【0148】図42の回路構成では、商・剰余算出回路51Aにおいて、入力チャネル番号を列の数Nで割ったときの商および剰余が算出され、その商が演算回路51Dに出力される。また、商・剰余算出回路51Bにおいては、出力チャネル番号を列の数Nで割ったときの商および剰余が算出され、その商が演算回路51Dに出力され、剰余が演算回路51Dに出力され、利金の資質回路51Cでは、各商・剰余算出回路51A、51Cからの刺索の値を用いて列差が演算されてメモリ40に送られる。また、演算回路51Dでは、各商・剰余算出回路51A、51Cからの商の値を用いて行差が演算されてメモリ40に送からの商の値を用いて行差が演算されてメモリ40に送からの商の値を用いて行差が演算されてメモリ40に送られる。

【0149】メモリ40には、前述の表5に示したような各列差に対応した補正角度の値と、各行差に対応した補正角度の値とがそれぞれ格納されていて、行列差演算回路51か6送られる列差または行差に従って該当する格納データが読み出される。なお、ここでは、列差およ50

び行差に対応した補正角度データをメモリ40に格納しておく構成を示したが、メモリ40に代えて、例えば図43に示すような掛算回路40°を設け、行列差演算回路51から送られる列差または行差に応じて補正角度を逐次計算することも可能である。

【0150】符号反転回路52Aは、列差に対応させてメモリ40から読み出された補正角度データが入力され、符号を反転させた補正角度をMEMSミラー駆動部 14B0U/Dカウンタ21Xに送る。また、符号反転回路52Aは、行差に対応させてメモリ40から読み出された補正角度データが入力され、符号を反転させた補正角度をMEMSミラー駆動部<math>14B0U/Dカウンタ21Yに送る。

【0151】上記のような第4の回路例を適用すること によって、メモリ40に必要とされるメモリ容量を、本 回路構成を適用しない図27に示したような構成の場合 に比べて大幅に削減させることが可能になる。なお、上 述した第1~第4実施形態では、3次元型の光信号交換 器として、図45に示したような構成を考えたが、本発 明が適用可能な光信号交換器の構成はこれに限られるも のではない。例えば、図44に示すように、入力側およ び出力側の各コリメータアレイ1A、1Bを並べて配置 した入出力一体型のコリメータアレイと、入力側および 出力側の各MEMSミラーアレイ2A、2Bを並べて配 置した入出力一体型のMEMSミラーアレイと、入力側 MEMSミラーからの光をシフトさせながら折り返して 出力側MEMSミラーに戻すシフト型折り返しミラー と、を有するような3次元型の光信号交換器などに対し ても本発明の制御技術を適用することが可能である。た だし、入出力一体型のMEMSミラーアレイを適用した 構成について、前述した初期値メモリの構成を最適化す るための第1~第4の回路例を採用することは除かれる ものとする。以上、本明細書で開示した主な発明につい て以下にまとめる。

【0152】(付記1) 反射面の角度が制御可能な複数のディルトミラーを平面上に配置した第1ミラーアンイを有し、入力された光信号を前記第1ミラーアレイを有し、入力された光信号で次反射して特定の位置から出力する光信号交換器についい。 (1) で、前記第1ミラーアレイとなび前記第2ミラーアレイの各ティルトミラーの反射面の角度を制御する制御装合の出力状態を検出する出力光検出手段と、該出力光検出手段の検出結果に基づいて、前記第1ミラーアレイで反射された光信出手段の検出結果に基づいて、前記第1ミラーサレイおよび、前記第2ミラーアレイの前記光信号を内射したなティルトミラーの反射面の角度を判断し、該各角度が予め設定した目標値に近づくように前記各ティルトミラーの反射面の角度を制工制制する日、を備えて構成されたことを特徴とする光信号交換器の制御装置されたことを特徴とする光信号交換器の制御装置

【0153】(付記2) 付記1に記載の制御装置であ

って、前記出力光検出手段は、前記第2ミラーアレイで 反射された光信号の一部を分岐する光分岐部と、該光分 岐部からの分岐光を2次元の領域を有する受光而で受光 して、前記分岐光についての位置情報を生成する位置情 報生成部と、を有し、前記角度制御手段は、前記位置情 報生成部からの位置情報と、前記各ティルトミラーの反 射面の角度の目標値に対応させて予め設定した初期位置 情報とを比較することで、前記光信号の到達位置の解差 を検出する位置差分検出部と、該位置差分検出部で検出 された到達位置の誤差を基に、前記各ティルトミラーの 10 反射面の角度ずれを算出して補正角度を演算する演算処 理部と、該演算処理部で演算された補正角度に従って前 記各ティルトミラーの反射面の角度を制御する補正制御 部と、を有することを特徴とする光信号交換器の制御装

【0154】(付記3) 付記2に記載の制御装置であ って、前記演算処理部は、前記位置差分給出部で輸出さ れる到達位置の誤差が略零となるように、前記第1ミラ ーアレイ側の反射面の角度のみを強制的に変化させたと きの第1角度変化量と、前記第2ミラーアレイ側の反射 面の角度のみを強制的に変化させたときの第2角度変化 量と、を用いて、前記各ティルトミラーの反射面の角度 ずれを算出して補正角度を演算することを特徴とする光 信号交換器の制御装置。

【0155】(付記4) 付記3に記載の制御装置であ って、前記演算処理部は、前記位置差分検出部で有意な 誤差が検出されない場合に、少なくとも前記第2ミラー アレイ側の反射面の角度を変化させたときに前記位置差 分検出部で検出される誤差の変化状態に応じて、光信号 の出力状態を判別するようにしたことを特徴とする光信 号交換器の制御装置。

【0156】(付記5) 付記3に記載の制御装置であ って、前記演算処理部は、前記位置差分給出部で有音か 誤差が検出されない場合に、前記位置情報生成部で得ら れる画像の図形情報に基づいて、光信号の出力状態を判 別するようにしたことを特徴とする光信号交換器の制御 装置。

【0157】(付記6) 付記2に記載の制御装置であ って、前記出力光検出手段は、前記第2ミラーアレイで 反射された光信号の一部を異なる位置で分岐する少なく 40 とも2つの光分岐部と、該各光分岐部からの分岐光を2 次元の領域を有する受光面で受光して、前記各分岐光に ついての位置情報をそれぞれ生成する少なくとも2つの 位置情報生成部と、を有し、前記角度制御手段は、前記 第1ミラーアレイおよび前記第2ミラーアレイの各反射 面の角度を強制的に変化させることなく、各々の反射面 の角度ずれを算出して角度補正を行うことを特徴とする 光信号交換器の制御装置。

【0158】(付記7) 付記2に記載の制御装置であ

反射された光信号の一部を分岐する光分岐部と、該光分 岐部からの分岐光を、2次元の領域を有し、かつ、前記 分岐光の伝搬方向に移動可能な受光面で受光して、前記 分岐光についての少なくとも2種類の位置情報を生成す る位置情報生成部と、を有し、前記角度制御手段は、前 記第1ミラーアレイおよび前記第2ミラーアレイの各反 射面の角度を強制的に変化させることなく、各々の反射 面の角度ずれを算出して角度補正を行うことを特徴とす る光信号交換器の制御装置。

40

【0159】(付記8) 付記1に記載の制御装置であ って、前記出力光検出手段は、前記特定の位置から出力 される光信号のパワーを検出する光パワー検出部を有 し、前記角度制御手段は、前記第1ミラーアレイの各テ ィルトミラーの反射面の角度を一定の制御方向に段階的 に変化させる第1ミラー駆動部と、前記第2ミラーアレ イの各ティルトミラーの反射面の角度を一定の制御方向 に段階的に変化させる第2ミラー駆動部と、前記第1ミ ラー駆動部および前記第2ミラー駆動部の少なくとも-方により反射面の角度を変化させた時の直前および直径 に前記光パワー検出部で検出される出力光パワーの各値 を比較し、該比較結果を基に前記第1ミラ―駆動部およ び前記第2ミラー駆動部における各制御方向を決定し て、前記光パワー検出部で検出される出力光パワーが横 大するように前記各ティルトミラーの反射而の角度をフ ィードバック制御する比較制御部と、有することを特徴 とする光信号交換器の制御装置。

【0160】(付記9) 付記8に記載の制御装置であ って、前記比較制御部は、前記光パワー検出部で検出さ れた出力光パワーを示す出力信号を一定の時間保持して 出力するホールド回路と、前記光パワー輸出部からの出 力信号および前記ホールド回路からの出力信号を比較 し、各出力信号で示される出力光パワーの大小関係に広 じてレベルが変化する信号を出力する比較回路と、該比 較回路からの出力信号のレベルに従って、前記第1ミラ 一駆動部および前記第2ミラー駆動部における各制御方 向を決定する信号を生成する制御信号生成回路と、前記 比較回路からの出力信号を監視して前記制御信号生成回 路の動作設定を制御する制御監視回路と、を有すること を特徴とする光信号交換器の制御装置。

【0161】(付記10) 付記8に記載の制御装置で あって、前記比較制御部は、前記第1ミラーアレイおよ び前記第2ミラーアレイの各ティルトミラーについて、 それぞれ、一方の軸方向の角度制御が完了した後に、他 方の軸方向の角度制御が行われるように、前記第1ミラ 一駆動部および前記第2ミラー駆動部を制御することを 特徴とする光信号交換器の制御装置。

【0162】(付記11) 付記8に記載の制御装置で あって、前記比較制御部は、前記第1ミラーアレイおよ び前記第2ミラーアレイの各ティルトミラーについて、 って、前記出力光検出手段は、前記第2ミラーアレイで 50 同一軸方向の角度制御が同時に行われるように前記第1 ミラー駆動部および前記第2ミラー駆動部を制御することを特徴とする光信号交換器の制御装置。

【0163】(付記12) 付記8に配載の制御装置であって、前記比較制御師は、前記第1ミラーアレイおよび前監第2ミラーアレイのをティルトミラーについてそれぞれ、異なる軸方向の角度制御が同時に行われるように前記第1ミラー駆動部まだ信号交換器の制御装置。【0164】(付記13) 付記8に記載の制御装置であって、前記比較制御部は、前記第1ミラーアレイ側のティルトミラーの異なる軸方向の角度制御が同時に行われるように前記第1ミラー駆動部を制御が同時に行われるように前記第1ミラー駆動部および前記第2ミラーアレイ側のティルトミラーの異なる軸方向の角度制御が同時に行われるように前記第1ミラー駆動部および前記第2ミラー駆動部を制御することを特徴とする光信号や複製の測線を勝

【0165】(付記14) 付記8に記載の制御装置で あって、前記比較制御部は、前記第1ミラー駆動部およ び前記第2ミラ一駆動に対して、前都対象となる各ティ レトミラーの反射面の角度に関する功期値をそれぞれ与 えることを特徴とする制御装置。

【0166】(付配15) 付配14に記載の制御装置であって、前記比較制御部は、入出力チャネルの組み合わせに対応した各ティルトミラーの反射面の角度に関する初期値を予め格納する記憶装置と、制御対象となる各テルトミラーを特定する功明値を洗め出して前記第1ミラー駆動部された球当である場合である。 第15一駆動部および前記第2ミラー駆動にそれぞれりなののである。 身後であるのアクセス信号を生成する初期値でとなっている場合である。 りついるでは、

【0167】(付記16) 付記15に記載の制御装置 30 であって、前記第1ティルトミラーアレイはよび前記第 2ティルトミラーアレイは、3 永元的に線対称となるように配置され、かつ、各々のアレイに配置された複数のティルトミラーに対して、前記線対称の軸を基準して対称になるように連続番号が削り返われ、前記記憶装置は、前記対称に割り張られたディルトミラー番号に対応させるとともに、各ティルトミラーの光学的特性を利用して関連付けが行われた前記初期値を格納し、前記の行列に表述ができませると、前記を格納し、前記が行列に表述ができませる。 40 限連付けられた初期値を形み出すための前記アクセス信号を生成することを特徴とする制御装置。

【0168】(付配17) 付記16に記載の制御装置であって、前記初期値アクセス制御回路は、前記チャネ 小情報に基づいて、前記第1アイルトミラーアレイの制御対象となるティルトミラーの第1番号と、前記第2ティルトミラーの第2番号とをそれぞれ検出し、前記第1ティルトミラーアレイの前記線対称の軸に垂直に並べられたティルトミラー数で前記第1番号を割り第したときの剰余と、前記50

第1番号および前記第2番号の差とをそれぞれ演算し、 該演算した剰余および差の各値を前記アクセス信号とし て前記記憶装置に伝え、前記記憶装置には、前記剰余お よび差を基準に関連付けされた前記初期値が格納されて いることを特徴とする制御装置。

【0169】(付配18) 付配17に記載の制御装置 であって、前記別城位アクセス制御回路は、前記第1番 号および前記第2番号が同じであるか否かを判定し、該 判定結果を含んだ前記アクセス信号を生成し、前記記記 装置には、前記第1番号および前記第2番号が同じなる ときの前記別期値が1つの固定値として格納されている ことを特徴とする制御装置。

【0170】(付記19) 付記16に記載の制御装置 であって、前記初期値アクセス制御回路は、前記チャネ ル情報に基づいて、前記第1ティルトミラーアレイの制 御対象となるティルトミラーの第1番号と、前記第2テ ィルトミラーアレイの制御対象となるティルトミラーの 第2番号とをそれぞれ検出し、前記第1番号および前記 第2番号の大小比較を行い、大小順に並べ替えた各番号 を前記アクセス信号として前記記憶装置に伝えるととも に、前記第1番号および前記第2番号の並べ替えを行っ たときには、前記記憶装置から読み出された初期値につ いて、前記第1ティルトミラーアレイのティルトミラー に対する初期値と、前記第2ティルトミラーアレイのテ ィルトミラーに対する初期値とを入れ替えた上で符号を 反転させる機能を備え、前記記憶装置には、前記第1番 号および前記第2番号の大小関係を基準に関連付けされ た前記初期値が格納されていることを特徴とする制御装 置。

【0171】(付記20) 付記16に配載の制御装置であって、前記初期値アクセス制御回路は、前記チャネル情報に基づいて、前記第1ティルトミラーアレイの制御対象となるティルトミラーの第1番号と、前記第2番号とをれぞれ検出し、前記第1番号および前記第2番号の大小比較を行い、前記第1番号が前記第2番号よりも大きいときには、前記検出された第1番号および第2番号を前記アクセス信号として前記記憶装置に伝え、前記後2番号を前記アクセス信号として前記記憶装置に伝え、前記後2番号を前記第1番号よりも大きいときに

は、前配検出された第1番号と同一列かつ同一行に位置する第2番号と、前配検出された第2番号と同一列かつ同一行に位置する第2番号と、前配検出された第2番号と下部にアクセス信号として前配配修装置に伝えるとともに、前配第1番号および前配第2番号の組入替えを行ったときには、前記修装置から跳み出された初期値につかて、前配終数でがたす。前の初期値の符号を反転させる機能を備え、前配配修装置には、前配第1番号および前配第2番号の大小関係を基準に関連が付けされた前配初期値が絡続されていることを特後とする制御装置

【0172】(付記21) 付記16に記載の制御装置

であって、前記初期値アクセス制御回路は、前記チャネル情報に基づいて、前記第15アルトミラーアレイの制御に基づいて、前記第15アルトミラーアレイの制御となるティルトミラーの第1番号と、前記第1番号および前記第2番号とをそれぞれ検出し、前記第1番号および前記第2番号について、前記線対称の軸に垂直な方向成分の相対差と、前記線対称の軸に平行な方向成分の相対差とを抽出し、該抽出した各相対差を前記アクセス信号として前記記憶装置に伝え、前記記憶装置には、前記各相対差を基準にして算出した補正角度が前記初期値として格 10 約されていることを特徴とする制御装置

【0173】(付記22) 付記21に配載の制御装置 であって、前記記憶装置に代えて、前記初期値アクセス 制御回路から伝えられる各相対差に従って補正角度を演 算する回路を設けたことを特徴とする制御装置。

【0174】(付記23) 反射面の角度が制御可能な複数のティルトミラーを平面上に配置した第1ミラーアレイを有し、入力された光信号を削記第1ミラーアレイを有し、入力された光信号を削記第1ミラーアレイなよび前記第2ミラーアレイで順次反射して特定の位置から出力する光信号交換器について、前記第1ミラーアレイおよび前記第1ミラーアレイで反射された光信号の出力状態を検出する出力光検出過程と、該出力光検出過程の検出結果に基づいて、前記第1ミラーアレイはよび前節第2ミラーアレイの配第1ミラーアレイはよび前節第2ミラーアレイの記2代号を反射した各ティルトミラーの反射面の角度を判断し、該各角度が予め設定した目標値に近づくように前記各フィルトミラーの反射面の角度を判断し、該各角度が予め設定した目標値に近づくように前記各フィルトミラーの反射面の角度を判断し、該各角度が予め設定した目標値に近づくように前記各アィルトミラーの反射面の角度を判断し、該各角度が予め設定とを特徴とする光信号交換器の制御方法。

【0175】(付記24) 付記23に記載の制御方法であって、前記出力光検出過程は、前記第25年アレイで反射された光信号の一部を分核し、該分時光を2次元の領域を有する受光面で受光して位置情報を生成し、前記角度制御過程は、前記出力光熱出過程で生成された位置情報と、前記各ティルトミラーの反射面の角度の間観光を検出し、該検出した到達位置の誤差を基に、前記各ティルトミラーの反射面の角度ずれを算出した相正角度を減算し、該資量に対した到達位置の誤差を基に、前記各ティルトミラーの反射面の角度で計を算出とを特徴とするとと、前記名ティルトミラーの反射面の角度を制御することを特徴とする光信号交換器の制御方法。

【0176】 (付記25) 付記23に記載の制御方法であって、前記出光検出過程は、前記特定の位置から出力される光信号のパワーを検出し、前記角度制御過程は、前記第1ミラーアレイの各ティルトミラーの反射面の角度を一定の制御方向に段階的に変化させる第1ミラー駅動部および前記第2ミラーアレイの各ティルトミラーの反射面の角度を一定の制御方向に段階的に変化させる50

る第2ミラー駆動部の少なくとも一方により反射面の角度を変化させた時の直前および直接に前記出力光検出過程で検出される出力光ペワーの各値を比較し、該比較結果を基に前記第1ミラー駆動部および前記第2ミラー駆動部における各制御方向を決定して、前記出力光検出過程で検出される出力光ペワーが増大するように前記各ティルトミラーの反射面の角度をフィードパック制御することを特徴とする光信号交換器の制御方法。

【0177】(付記26) 付記25に記載の制御方法 0 であって、前記負度制御過程は、前記第1ミラー駆動部 および前記第2ミラー駆動に対して、制御対象となる各 ティルトミラーの反射面の角度に関する初期値をそれぞ れ与えることを特徴とする光信号交換器の制御方法。

【0178】(付記27) 付記26に記載の制御方法であって、前記角度制御通程は、入出力チャネルの組み合わせに対応した各ティルトミラーの反射面の角度に関する初期値が記憶装置に予め格納され、制御対象となる各ティルトミラーを特定するチャネル情報に従って、前記記憶装置に格納された該当する初期値を読み出して前記第1ミラー駆動配および前記第2ミラー駆動にそれぞれ与えることを特徴とする光信号交換器の制御方法。

用しく関連付けか行われた削記初期値が削記記憶装置に 格納され、前記チャネル情報に基づいて特定した各ティ ルトミラー番号に応じて、前記記憶装置の関連付けられ た初期値を読み出すことを特徴とする光信号交換器の制 側方法。

[0180]

【発明の効果】以上説明したように、本発明にかかる光信号交換器の制御装置および制御方法によれば、第1、2ミラーアレイで順次反射された光信号についての出力状態を検出し、その検出結果を基に各ティルトミラーの角度ずれ判断して補正するようにしたことで、低光損失、かつ、高精度の光信号交換器を実現することができる。これにより、小型で大容量の光交換機や光スイッチの開発が可能になる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施形態にかかる光信号交換器の 制御装置の全体構成を示す概略図である。

【図2】同上第1実施形態における制御回路の具体的な機能構成の一例を示すプロック図である。

【図3】同上第1実施形態における位置情報記憶部の具 0 体的な構成例を示す図である。 【図4】同上第1実施形態における初期位置情報を説明 するための配置図である。

9 るための配慮図である。 【図5】同上第1実施形態において位置ずれを検出する 具体的な方法を説明するための図である。

【図6】同上第1実施形態において演算処理部で実行される処理を説明する図であって、(A) はX軸方向の光路を模式的に示し、(B) は (A) の状態に関して幾何学的に等価な関係を示したものである。

【図7】図6の状態から出力側MEMSミラーの角度を 強制的にずらしたときの状態を説明する図であって、

(A) はX軸方向の光路を模式的に示し、(B) は

(A) の状態に関して幾何学的に等価な関係を示したも のである。

【図8】図6の状態から入力側MEMSミラーの角度を 強制的にずらしたときの状態を説明する図であって

(A) はX軸方向の光路を模式的に示し、(B) は

(A) の状態に関して幾何学的に等価な関係を示したものである。

【図9】本発明の第1実施形態において制御開始時に位 置ずれが発生していない場合の状態に関する幾何学的に 20 等価な関係を示した図である。

【図10】同上第1実施形態についてCCDイメージセンサで得られる画像の一例を光信号の入射状態に応じて示した図である。

【図11】同上第1実施形態についてCCDイメージセンサで得られる画像の具体的な処理方法の一例を説明する図である。

【図12】図11における「NG1」の状態における光路を模式的に示した図である。

【図13】本発明の第2実施形態にかかる光信号交換器の制御装置の要部構成を示す概略図である。

【図14】同上第2実施形態に関連する第1の応用例の 要部構成を示す概略図である。

【図15】図14の変形例の要部構成を示す概略図である。

【図16】本発明の第2実施形態に関連する第2の応用 例の要部構成を示す概略図である。

【図17】同上第2実施形態に関連する第3の応用例の要部構成を示す概略図である。

【図18】本発明の第3実施形態にかかる光信号交換器 40の制御装置の全体構成を示す概略図である。

【図19】同上第3実施形態における光パワー検出部、 比較制御部およびMEMSミラー駆動部についての具体 的な構成例を示すブロック図である。

【図20】3次元型の光信号交換器について出力光ファイバに結合される光信号のパワーと各MEMSミラーの 角度との関係を示す図である。

【図21】本発明の第3実施形態におけるカウンタ制御信号生成回路および監視制御回路の具体的な回路例を示すブロック図である。

【図22】同上第3実施形態における比較制御部の動作 を説明するタイミングチャートである。

【図23】同上第3実施形態に関連する変形例の構成を示したブロック図である。

【図24】本発明の第4実施形態における比較制御部の 具体的な構成例を示すブロック図である。

【図25】同上第4実施形態における比較制御部の動作を説明するフローチャートである。

【図26】同上第4実施形態に関連する応用例について 10 の比較制御部およびMEMSミラー駆動部の構成の示し

たブロック図である。 【図27】本発明の第3、第4実施形態に関連して、カ ウンタ初期値を格納するメモリを設けた構成の一例を示 すブロック図である。

【図28】図27の初期値メモリの構成を最適化するために各MEMSミラーに割り振る番号の規則性を説明する図である。

【図29】初期値メモリの構成を最適化するための第1 の回路例を示すプロック図である。

20 【図30】図29の第1の回路例において利用するME MSミラーの光学特性を説明するための図である。

【図31】図29の第1の回路例に改良を施した一例を 示すプロック図である。

【図32】図29の第1の回路例に改良を施した他の一例を示すプロック図である。

【図33】初期値メモリの構成を最適化するための第2 の回路例を示すブロック図である。

【図34】図33の第2の回路例における大小比較/ソート回路の具体的な構成例を示す回路図である。

【図35】図33の第2の回路例におけるソート/符号 反転回路の具体的な構成例を示す回路図である。

【図36】初期値メモリの構成を最適化するための第3 の回路例において利用するMEMSミラーの光学特性を 説明するための図である。

【図37】第3の回路例を示すブロック図である。

【図38】図37の第3の回路例における組み替え回路 の具体的な構成例を示す回路図である。

【図39】図38の組み替え回路における処理動作を説明するための図である。

【図40】初期値メモリの構成を最適化するための第4 の回路例において利用するMEMSミラーの光学特性を 説明するための図である。

【図41】第4の回路例を示すプロック図である。

【図42】図41の第4の回路例における行列差演算回路の具体的な構成例を示す回路図である。

【図43】図41の第4の回路例についてメモリに代わる掛算回路を例示した図である。

【図44】本発明が適用可能な3次元型の光信号交換器についての他の構成例を示す斜視図である。

50 【図4.5】一般的な3次元型の光信号交換器の構成例を

符号反転回路

示す斜視図である。 【図46】図45の光信号交換器における光信号の位置 ずれを模式的に示した図である。

【符号の説明】

1A. 1B コリメータアレイ

2A. 2B MEMSミラーアレイ

3, 3' ビームスプリッタ 4. 4' レンズアレイ

5, 5', 5'' CCDイメージセンサ

6 制御回路 6 A 位置情報記憶部

6 B 初期位置情報記憶部

6C, 6D 位置差分检出部

6G. 6H MEMSミラードライバ

6 T 印加電圧読み取り部

6 I **浦**算処理部

7 ハーフミラー 光源

10A, 10B 光ファイバアレイ

[図1]

11 光カプラアレイ

\* 12 光パワー輸出部

13 比較制御部

13C ホールド回路

1 3 D 比較回路

13E カウンタ制御信号生成回路

13F 制御監視回略

14A, 14B MEMSミラー駆動部

メモリ 4.0

4 1 入力Ch 検出回路

10 4 2 出力Ch検出回路 43 剰余演算回路

4 4 差分演算回路

4 5 ... 0 検出回路

46 大小比較/ソート回路

4 7 ソート/符号反転回路

48 組み替え回路

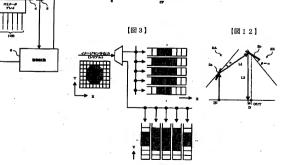
49 大小比較回路 50A, 50B, 52A, 52B

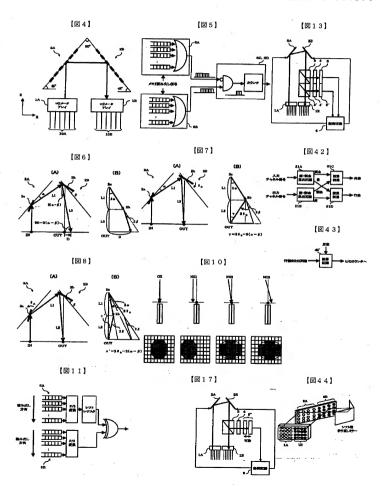
5.1 行列差演算回路

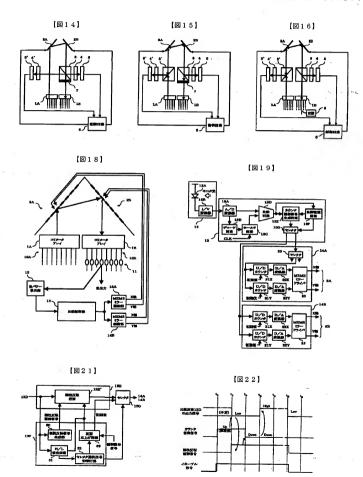
【図2】

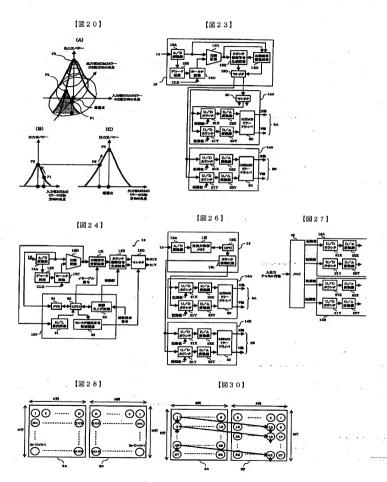
\*20

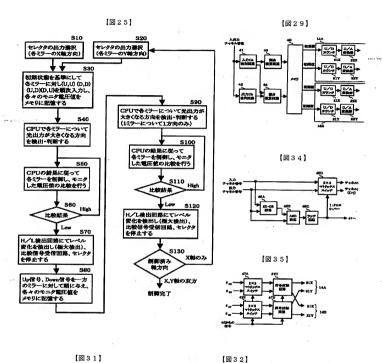
[図9]

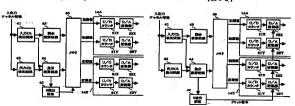


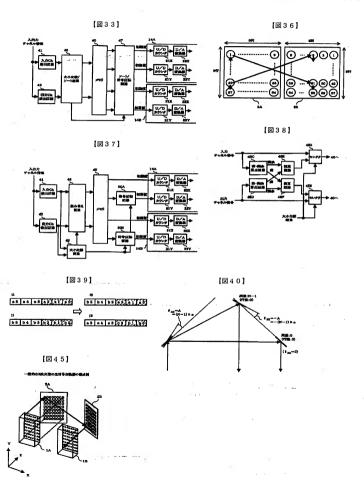


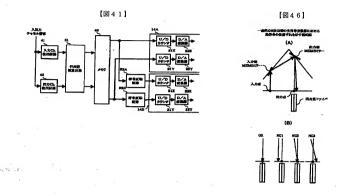












フロントページの続き

Fターム(参考) 2H041 AA12 AB14 AC04 AZ00 AZ03

AZ06

5K002 BA02 BA21 DA13 GA07

5K069 AA02 DB33 EA24 EA27